



อภินันทนาการ

สัญญาเลขที่ R2558002 ก่อสมุด

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

การสังเคราะห์และสมบูรณ์化ทางไฟฟ้าของเซรามิกเลดแมกนีเชียมในโอเบต-เลดเซอร์โคเนต
ให้ทานต์ที่เตรียมด้วยวิธีการเผาใหม่

Synthesis and Electrical Properties of $0.3\text{Pb}(\text{Mg}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3$ - $0.7\text{Pb}(\text{Zr}_{0.48}\text{Ti}_{0.52})\text{O}_3$

Ceramics Prepared via Combustion Technique

รองศาสตราจารย์ อาธิตย์ เหล่าวานิชวัฒนา

ผศ. ดร. ธีระชัย บงการณ์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันลงทะเบียน..... ๑๘.๓.๒๕๕๐
เลขทะเบียน.....
ลงรีบกันนั่งสีอ. ๑ TP ๘๒๔

๑๖๒๑๕

๒๕๕๘

สนับสนุนโดยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้วิจัยและคณบดีขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทุกท่านซึ่งอำนวยความสะดวกแก่ภารกิจฯ

ขอขอบคุณ Science Lab Center คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำวิจัย

รองศาสตราจารย์ อاثิตย์ เหล่าวานิชวัฒนา และคณบ



บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาของปัญหา

ปัจจุบันการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ได้มีวิทยาการที่รุดหน้า เพื่อรองรับกับความต้องการการใช้งานและอำนวยความสะดวกสบายแก่มนุษย์ในรูปแบบต่างๆ ดังนั้นจึงมีการคิดค้น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆ อย่างมากมาย ทำให้การศึกษาและพัฒนาวัสดุที่มีสมบัติทางไฟฟ้าที่ดีมีความจำเป็นอย่างมากต่อการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น เซรามิก $0.3\text{Pb}(\text{Mg}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3\text{-}0.7\text{Pb}(\text{Zr}_{0.48}\text{Ti}_{0.52})\text{O}_3$ (PMN-PZT) เป็นวัสดุพิโซอิเล็กทริกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ [1-6] โดยที่อัตราส่วนบริเวณ MPB เช่นเดียวกับการผลิตเซรามิกที่ได้อิเล็กทริกสูง มีค่าการสัญญาณไฟฟ้าสูง ($d_{33}=400 \text{ pC/N}$) จึงมีความเหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้เป็นระบบกลไฟฟ้าจุลภาค (Microelectromechanical System: MEMS) ในไมโครแอคชูแอเตอร์ ซึ่งใช้เป็นส่วนควบคุมการทำงานของหัวอ่าน (Read/Write Head) ในอาร์ดดิสก์ไดร์ฟและยังสามารถนำมาใช้เป็นทرانสดิวเซอร์ (transducer) โซนาร์ (sonar) ตัวรองสัญญาณ และเซนเซอร์ (sensor) [4-6]

อย่างไรก็ตามการเตรียมเซรามิกพิโซอิเล็กทริกที่มี $\text{Pb}(\text{Mg}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3$ (PMN) เป็นองค์ประกอบหลัก ให้มีความบริสุทธิ์และมีความหนาแน่นสูงเตรียมได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากเฟสแปรปลงอม (Pyrochlore) ที่มักก่อตัวขึ้นปะปนกับเฟสของ PMN ระหว่างกระบวนการเตรียมเสมอ ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเพาะมากที่พยายามคิดค้นกระบวนการเตรียมเซรามิก PMN ไว้หลายหลายวิธี เช่น seeding method, columbite method, solgel, molten salts method และ solid state reaction เป็นต้น [6-8] ซึ่งแต่ละวิธีมีขั้นตอนการเตรียมและความยุ่งยากต่างกันออกไป ทั้งนี้ การเตรียมด้วยวิธีดังที่กล่าวข้างต้นนั้น มักจะทำที่อุณหภูมิสูง เป็นเหตุให้สารตั้งต้นบางตัวที่ใช้ในการผลิตเซรามิกเกิดการแตกหักตัวไปก่อน เช่น เลดอกอไซด์ (PbO) เนื่องจากมีจุดหลอมเหลวต่ำประมาณ 850 องศาเซลเซียส และการซินเตอร์เซรามิกด้วยวิธีที่กล่าวข้างต้น ต้องทำที่อุณหภูมิสูงกว่า 1000 องศาเซลเซียส จึงทำให้เกิดการระเหยของตะกั่ว ส่งผลให้สมบัติต่างๆ ของเซรามิกเปลี่ยนแปลงไป และไม่เหมาะสมกับการนำไปประยุกต์ใช้ ทำให้นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยพยายามหุ่นเหล็กและพยายาม คิดค้น เทคนิคในการสังเคราะห์เซรามิกดังกล่าวเพื่อให้มีคุณภาพที่ดี และได้สมบัติต่างๆ ตามที่ต้องการ วิธีการเผาไหม้ (combustion technique) เป็นวิธีการเตรียมเซรามิกวิธีหนึ่งที่รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน [9-16] เนื่องจากเป็นเทคนิคที่มีความสะดวก ไม่ยุ่งยาก เตรียมสารได้ในปริมาณครั้งละมากๆ และใช้ต้นทุนต่ำ ทั้งนี้วิธีการเผาไหม้ เป็นวิธีที่อาศัยการปลดปล่อยพลังงาน ที่ได้จากการจุดระเบิดซึ่งเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาเคมีของเชื้อเพลิง เช่น

ยูเรีย (urea) เอ็กซ์เมทิลเททรมีน (hexamethyltetra-mine) และ ไกลซีน (glycine) เป็นต้น พลังงานที่ได้จากการจุดระเบิดนี้ช่วยให้อุณหภูมิในการเผาสารลดลง จึงทำให้ประหยัดพลังงานอย่างมาก และเทคนิคการเผาไหม้นี้ยังเป็นวิธีเดียว ในการเตรียมผงผลึกที่ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นและเกิดปฏิกิริยาระหว่างสารตั้งต้นในระดับโมเลกุลอย่างรวดเร็ว จึงทำให้ผงผลึกที่ได้มีคุณภาพดี มีองค์ประกอบทางเคมีตามที่ต้องการ และมีขนาดอนุภาคเฉลี่ยในระดับนาโน

โครงการวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาเรื่องไข่ที่เหมาะสมในการเตรียมเซรามิกพิโซอิเล็กทริก $3\text{Pb}(\text{Mg}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3-0.7\text{Pb}(\text{Zr}_{0.48}\text{Ti}_{0.52})\text{O}_3$ ด้วยวิธีการเผาไหม้ หลังจากนั้นศึกษาโครงสร้างผลึกโครงสร้างจุลภาค การเปลี่ยนแปลงเฟส สมบัติภายใน และการประเมินคุณภาพ รวมถึงการใช้ประโยชน์อิเล็กทรอนิกส์ต่อไป

จุดมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาการสังเคราะห์ผงผลึกและเซรามิก $3\text{Pb}(\text{Mg}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3-0.7\text{Pb}(\text{Zr}_{0.48}\text{Ti}_{0.52})\text{O}_3$ ที่อุณหภูมิต่ำด้วยวิธีการเผาไหม้
2. เพื่อศึกษาโครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาค และศึกษาสมบัติทางไฟฟ้า ของผงผลึกและเซรามิกที่เตรียมได้จากข้อ 1
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเงื่อนไขการเตรียมและสมบัติต่างๆ ของเซรามิก $3\text{Pb}(\text{Mg}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3-0.7\text{Pb}(\text{Zr}_{0.48}\text{Ti}_{0.52})\text{O}_3$ ที่เตรียมได้จากข้อ 1
4. เพื่อผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหม่มีศักยภาพสามารถนำไปใช้ในด้านการวิจัยสูงสุด
5. เพื่อสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่ผลงานในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ

ขอบเขตของงานวิจัย

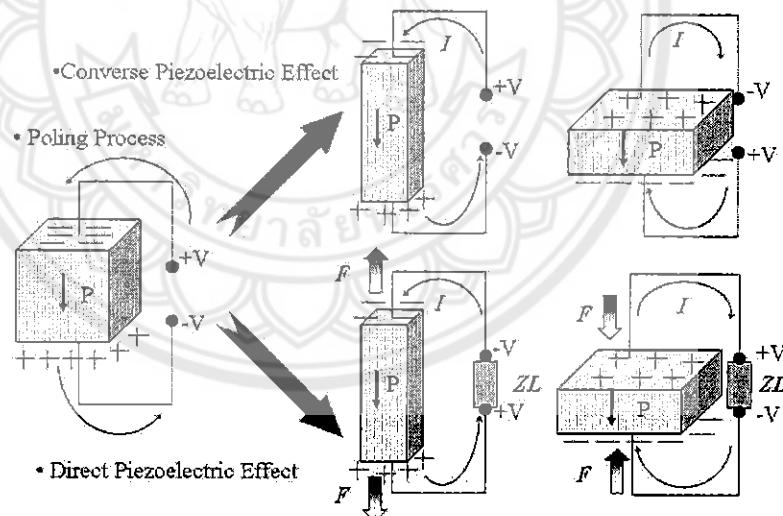
1. เตรียมผงผลึก $3\text{Pb}(\text{Mg}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3-0.7\text{Pb}(\text{Zr}_{0.48}\text{Ti}_{0.52})\text{O}_3$ ด้วยวิธีการเผาไหม้ โดยใช้เงื่อนไขการเตรียมต่างๆ
2. ศึกษาโครงสร้างเฟส และศึกษาโครงสร้างจุลภาคของผงผลึกที่เตรียมได้จากข้อ 1
3. เตรียมเซรามิก $3\text{Pb}(\text{Mg}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3-0.7\text{Pb}(\text{Zr}_{0.48}\text{Ti}_{0.52})\text{O}_3$ โดยใช้เงื่อนไขการเผาชิน เตอร์ที่อุณหภูมิต่างๆ
4. นำเซรามิกที่เตรียมได้จากข้อ 3 มาตรวจสอบสมบัติ ทางกายภาพ โครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาค สมบัติทางไฟฟ้า และสมบัติทางไฟฟ้าเชิงกล

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

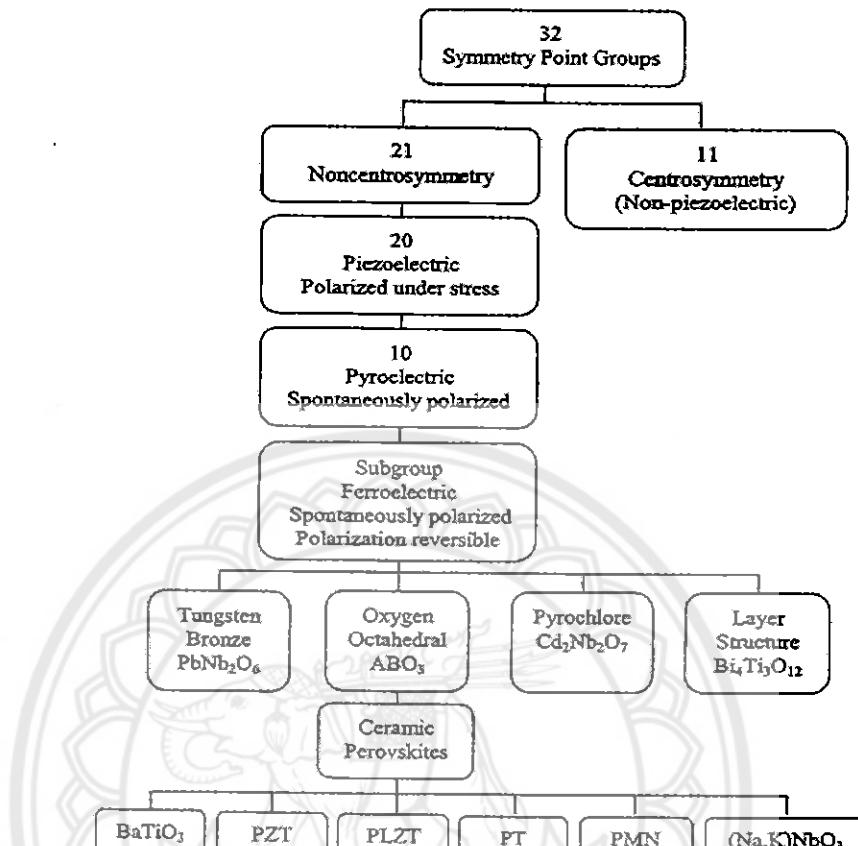
สมบัติพิโซอิเล็กทริก (Piezoelectric property)

คำว่า “พิโซ” มาจากภาษากรีก แปลว่า “กด” ดังนั้นพิโซอิเล็กทริก จึงหมายความว่า ความสามารถของวัสดุในการเปลี่ยนแรงกดที่ได้รับให้เป็นกระแสไฟฟ้า ซึ่งแรงกดที่ได้รับเป็นแรงทางกล ทำให้เกิดความเครียดในผลึกขึ้น จึงเกิดการเรียงตัวไปทางเดียวทันเรียกว่าการโพลาไรเซชัน และการให้กระแสออกมานี้โดยสภาพพิโซอิเล็กทริกถูกค้นพบครั้งแรก โดย Jacques และ Pierre เมื่อปี พ.ศ. 1880 ในสารประกอบผลึกเชิงเดียว เช่น ควอทซ์ (quartz) และ Rochelle salt ($\text{NaKC}_4\text{H}_4\text{O}_6\text{4H}_2\text{O}$) สภาพพิโซอิเล็กทริกสามารถเกิดขึ้นได้ 2 แบบ คือ แบบตรง (direct piezoelectric effect) และแบบผันกลับได้ (converse piezoelectric effect) กล่าวคือ สภาพพิโซอิเล็กทริกแบบตรงสามารถเปลี่ยนแรงทางกลให้เป็นได้ไฟได้ ดังภาพ 1 ในทำงกลับกันสภาพ พิโซอิเล็กทริกแบบผันกลับสามารถเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าให้เป็นแรงกลได้ ดังภาพ 1 ซึ่งระดับการเกิดโพลาไรเซชันจะขึ้นกับความเครียดที่เกิดจากแรงที่ได้รับ นอกจากนี้ทิศทางของสนามไฟฟ้าที่ได้แก่สัดชนิดนี้ จะเป็นตัวกำหนดว่าวัสดุจะขยายหรือหดลง [17]



ภาพ 1 原理การณ์พิโซอิเล็กทริกในวัสดุ [17]

หน่วยเซลล์ (Unit cell) ของโครงสร้างผลึกในวัสดุมีความสำคัญมากต่อสภาพพิโซอิเล็ก-ทริก กล่าวคือ สภาพพิโซอิเล็กทริกจะเกิดขึ้นได้ในวัสดุที่ไม่มีความสมมาตรกับจุดศูนย์กลางของหน่วยเซลล์ เท่านั้น ดังนั้น จึงสามารถแบ่งกลุ่มผลึก 32 กลุ่ม เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือประเภทแรกเป็นสารที่มี ความสมมาตรกับจุดศูนย์กลางของหน่วยเซลล์มีทั้งหมด 11 กลุ่ม อีกประเภทหนึ่งเป็นสารที่ไม่มีความ สมมาตรกับจุดศูนย์กลางของหน่วยเซลล์ มีทั้งหมด 21 กลุ่ม ดังภาพ 2



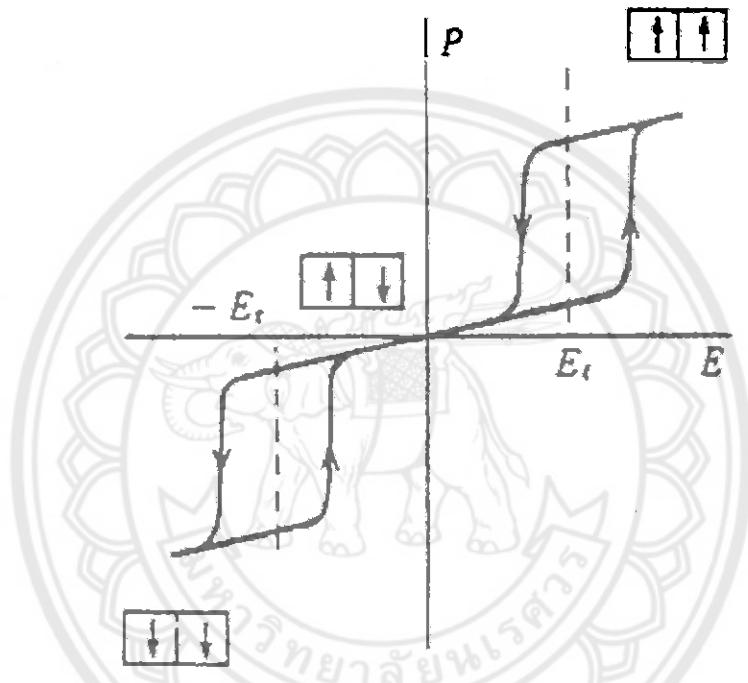
ภาพ 2 แผนภาพแสดงการแบ่งกลุ่มพิโซอิเล็กทริกและกลุ่มย่อย [18]

ใน 21 กลุ่ม เป็นสารที่ไม่มีความสมมาตรกับจุดศูนย์กลางของหน่วยเซลล์ดังกล่าวนั้น มี 20 กลุ่ม ที่มีสมบัติเป็นสารพิโซอิเล็กทริก และในสาร 20 กลุ่มนี้มีกลุ่มย่อยที่เป็นสารเฟรโรอิเล็กทริก ดังภาพ 2 ซึ่งข้อแตกต่างของวัสดุทั้ง 2 ชนิดนี้ คือความสามารถในการเกิดโพลาไรเซชัน โดยสารพิโซอิเล็กทริกไม่สามารถเกิดโพลาไรเซชันด้วยตนเองได้ แต่จะเกิดเมื่อให้แรงกดต่อผลึกเท่านั้น ในขณะที่สารเฟรโรอิเล็กทริกสามารถเกิดโพลาไรเซชันด้วยตนเองได้แม้จะไม่มีแรงกลมภาระทำ

แอนติเฟรโรอิเล็กทริก (Anti ferroelectric)

สารแอนติเฟรโรอิเล็กทริกเป็นสารที่สามารถเกิดโพลาไรเซชันได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องรับแรงกล เข่นเดียวกับสารเฟรโรอิเล็กทริก แต่ทิศทางของโพลาไรเซชันในแต่ละโดเมน (โดเมน คือ บริเวณที่หน่วยเซลล์มีสภาพข้ามกัน) จะมีทิศทางตรงกันข้ามกันเกิดการหักล้างกัน ทำให้ค่าโพลาไรเซชันสุทธิ (net polarizations) มีค่าเป็นศูนย์ สารแอนติเฟรโรบางชนิดเมื่อถูกเห็นยืนๆโดย surname ไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนเป็นสารเฟรโรอิเล็กทริกได้ [18]

ในสนามไฟฟ้าต่ำ สารแอนติเฟอร์โรอิเล็กทริกจะมีค่าโพลาไรเซชันที่ถูกเหนี่ยวนำ (induced polarization) เป็นสัดส่วนโดยตรงกับสนามไฟฟ้า เมื่อสนามไฟฟ้าที่ใส่เข้าไปมีค่าเกินกว่าสนามไฟฟ้าวิกฤต (critical field, E_{crit}) ทำให้ผลึกภายในเป็นเฟอร์โรอิเล็กทริกและโพลาไรเซชันจะแสดงอิสเทอเรชันที่มีความสัมพันธ์กับสนามไฟฟ้า หากหยุดป้อนสนามไฟฟ้าดังกล่าวผลึกจะกลับเป็นสถานะแอนติโพลาร์ (anti polar state) และโพลาไรเซชันที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเองนั้น จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในขณะนั้น โดยธรรมชาติของสารแอนติเฟอร์โรอิเล็กทริกจะมีวงรอบอิสเทอเรชัน 2 วง (double hysteresis curve) ดังภาพ 3



ภาพ 3 วงรอบอิสเทอเรชันระหว่างโพลาไรเซชันกับสนามไฟฟ้าในของสารแอนติเฟอร์โรอิเล็กทริก [18]

เฟอร์โรอิเล็กทริก (Ferroelectric)

สารเฟอร์โรอิเล็กทริกเป็นสารที่ไม่มีความสมมาตรกับจุดศูนย์กลางของหน่วยเซลล์ จึงทำให้สามารถสร้างได้โดยไม่ต้องได้รับแรงกล ซึ่งสามารถแยกสารเฟอร์โรอิเล็กทริกออกจากวัสดุได้อิเล็กทริก ด้วยการตอกด้านหรือรีมาเนนท์ โพลาไรเซชัน (remanent polarization: P_R) เมื่อสนามไฟฟ้าที่ใส่เข้าไปมีค่าเป็นศูนย์ [33] โดยปกตินั้นโพลาไรเซชัน (P) เป็นผลมาจากการสนามไฟฟ้าซึ่งจัดเรียงข้าวคู่อ่อน (atomic dipole) หรือข้าวโมเลกุล (molecular dipole) อย่างเป็นระเบียบ ในสารหلامยชนิดโพลาไรเซชันเป็นสัดส่วนโดยตรงกับสนามไฟฟ้า เมื่อสนามไฟฟ้า \bar{E} มีความเข้มน้อย

$$\bar{P} = \epsilon_0 \chi_e \bar{E} \quad (1)$$

เมื่อ χ_e เป็นค่าคงที่เรียกว่า สภาพรับได้ทางไฟฟ้า (electric susceptibility) ของตัวกลาง ค่า χ_e ขึ้นกับโครงสร้างทางจุลภาค (microscopic structure) ของสารที่พิจารณาและ ϵ_0 เป็นสภาพ ยอมของสูญญากาศ (permittivity of a vacuum) มีค่าคงที่ประมาณ $8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ โปรดสังเกตว่า สนามไฟฟ้า E ในสมการ (1) นี้เป็นสนามไฟฟ้าทั้งหมด ซึ่งอาจเกิดจากส่วนของประจุ อิสระและส่วนของโพลาไรเซชันที่สนาม \bar{E} ผลิตขึ้นเอง

χ_e ไม่มีทิศทาง และการจัดไฟฟ้า (electric displacement: D) มาจากการกระจายประจุ อิสระเท่านั้น ซึ่งมีความสัมพันธ์ตามสมการ (2)

$$\bar{D} = \epsilon_0 \bar{E} + P \quad (2)$$

จากสมการ (1) และ (2) จะได้ความสัมพันธ์เป็น

$$\bar{D} = \epsilon_0 \bar{E} + \epsilon_0 \chi_e \bar{E} = \epsilon_0 (1 + \chi_e) \bar{E} \quad (3)$$

ดังนั้นไม่เพียงแต่ P เท่านั้นที่ขึ้นกับ \bar{E} แต่ \bar{D} ก็ขึ้นกับ \bar{E} ด้วยเช่นกัน

$$\bar{D} = \epsilon \bar{E} \quad (4)$$

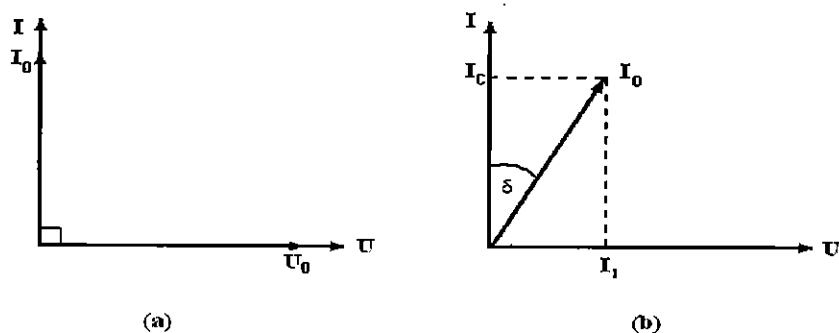
$$\epsilon = \epsilon_0 (1 + \chi_e) \quad (5)$$

เรียก ϵ ว่า สภาพยอม (Permittivity) ของวัสดุในสูญญากาศ ไม่มีสารใดก่อให้เกิดโพลาไรซ์ ดังนั้น สนามไฟฟ้าที่ได้ทางไฟฟ้าจะเป็นศูนย์ และสภาพยอม (ϵ) จะมีค่าเท่ากับ ϵ_0 และจากสมการ (5) จะได้

$$\epsilon_r = 1 + \chi_e = \frac{\epsilon}{\epsilon_0} \quad (6)$$

เมื่อ ϵ_r คือ สภาพยอมสัมพัทธ์ (relative permittivity) หรือ ค่าคงที่ได้อิเล็กทริกในวัสดุเฟอร์โรอิเล็กทริก ส่วนใหญ่ค่าคงที่ได้อิเล็กทริก ϵ_r จะมีค่าสูง ดังนั้น $P >> \epsilon_0 \bar{E}$ และ $D \approx P$ เมื่อป้อนไฟฟ้า กระแสสลับให้กับวัสดุได้อิเล็กทริก สนามไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดเป็นเหตุให้เกิดไฟโพลาภายในวัสดุได้อิเล็กทริก ในกรณีอุดมคติ ไฟโพลาภายในวัสดุได้อิเล็กทริกสามารถถลับทิศทางได้ตามความถี่ของ แหล่งกำเนิด กรณีกระแสสลับ (I) และศักย์ไฟฟ้า (V) มีความต่างไฟสักน้อย 90 องศา ดังภาพ 4(a) ทำให้ผลคูณสเกลาร์ (scalar product) ของ I และ V เท่ากับศูนย์ ดังนั้นจึงไม่มีการสูญเสียพลังงานของ วัสดุได้อิเล็กทริก (dielectric loss: $\tan \delta$) เกิดขึ้น แต่ในความเป็นจริงการถลับทิศทางของไฟโพลจะ ก่อให้เกิดความต้านทานภายในเนื้อวัสดุเอง ทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานขึ้น ซึ่งกรณีกระแสไฟฟ้ากับ ศักย์ไฟฟ้ามีความต่างไฟสักน้อยกว่า 90 องศา ดังภาพ 4 (b) โดยการสูญเสียพลังงานที่เกิดขึ้นนั้น สามารถวัดได้จากการทดลองและเป็นอัตราส่วนโดยตรงกับสภาพยอม

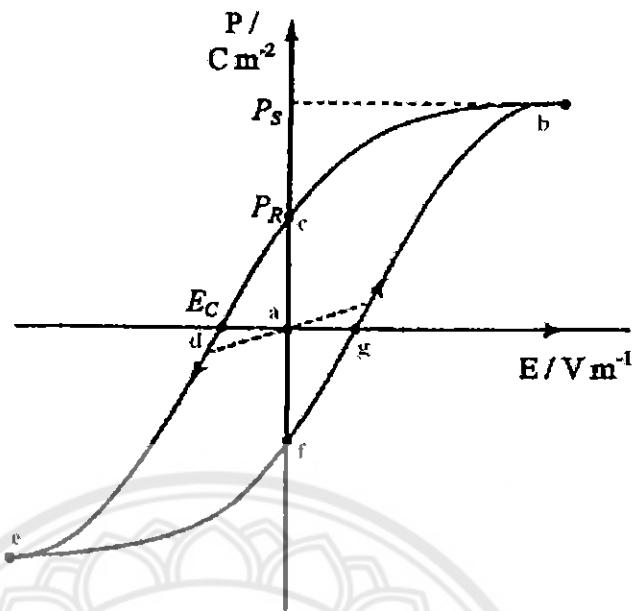
$$\tan \delta = \frac{\epsilon''}{\epsilon'} \quad (7)$$



ภาพ 4 ความต่างเฟสระหว่างกระแสลับ (I) และศักยไฟฟ้า (V) ของวัสดุไดอิเล็กทริก
(a) กรณีไม่มีการสูญเสียพลังงาน (b) กรณีมีการสูญเสียพลังงาน

ในวัสดุเฟอร์โรอิเล็กทริกการสับทิศทางของไดโอดตามความถี่ของแหล่งกำเนิด ได้ ความสัมพันธ์ระหว่างการโพลาไรเซชันและสนามไฟฟ้า (Polarization versus field) ซึ่งความสัมพันธ์ จะพบในรูปของวงรอบไฮสเตอรีซิส (hysteresis loop) ดังภาพ 5

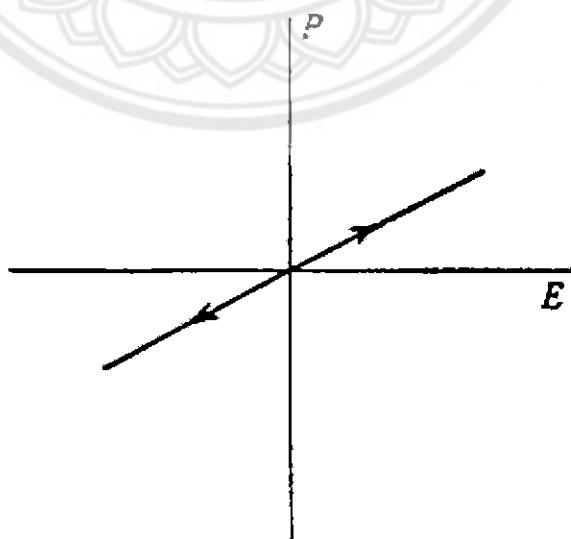
เมื่อให้สนามไฟฟ้าเข้าไปครั้งแรกการเกิดโพลาไรเซชันเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งถึงจุดอิ่มตัว (saturation polarization) คือจุด b ซึ่งการเกิดโพลาไรเซชันมีค่ามากที่สุด ได้โพลทั้งหมดจะเรียงตัวช้านกัน และหากเพิ่มสนามไฟฟ้าไปมากกว่านั้น ก็ไม่มีผลต่อการเกิดโพลาไรเซชัน เมื่อสนามไฟฟ้ามีค่าลดลงแทนที่การโพลาไรเซชันจะถอยกลับไปตามเส้นทางเดิมเหมือนตอนเริ่มต้น ($P = 0$) แต่กลับไปสู่ทิศทางที่แตกต่างกัน แม้ว่าไม่มีการให้สนามไฟฟ้า ($E = 0$) แก่ร์สดูเฟร์โรอิเล็กทริกก์ตาม แต่ยังคงมีโพลาเรซชันเหลืออยู่ หรือรีเมานท์ โพลาไรเซชัน (remanent value: P_R) ที่จุด C ถ้าเราต้องการกำจัดโพลาไรเซชันที่ยังคงเหลืออยู่ เราต้องให้สนามไฟฟ้าย้อนกลับทิศทางเดิม (นั่นคือ $-E$) โพลาไรเซชันจะลดลงสู่ศูนย์ที่จุด d ซึ่งเรียกว่าสนามโคเออร์ซีฟ (coercive field: E_C) ถ้าเราพยายามให้สนามไฟฟ้าในทิศทางลบนี้สูงขึ้นอีก ในที่สุดก็จะถึงจุดอิ่มตัว ที่จุด C ขึ้นได้โพลทั้งหมดซึ่งไปทางขวา เมื่อถึงขั้นตอนนี้ ถ้าไม่ป้อนกระแสไฟฟ้าให้กับร์สดูเฟร์โรอิเล็กทริก แล้วปล่อยให้วัสดุที่มีโพลาไรเซชันเพิ่มขึ้นไปทางขวา ยังจุด f เพื่อให้ครบวงจร ต้องป้อนกระแสไฟฟ้าอีกครั้งในทิศทางบวก โพลาไรเซชันจะกลับสู่ศูนย์ที่จุด d และในที่สุดก็จะมุ่งไปสู่จุดอิ่มตัวที่จุด b [17, 19]



ภาพ 5 วงรอบอิสเทอร์ซิสระห่วงโพลาไรเซชันกับสนามไฟฟ้าในสารเฟรโรอิเล็กทริก [19]

พาราอิเล็กทริก (Paraelectric)

เฟลพาราอิเล็กทริกเกิดขึ้นที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิเฟสเฟรโรอิเล็กทริกและเฟสแอนติเฟรโรอิเล็กทริก [18] ซึ่งสารพาราอิเล็กทริกจะประพฤติตัวเป็นจนวนตามปกติ มีโครงสร้างที่สมมาตร จึงไม่สามารถเกิดโพลาไรเซชันได้ด้วยตนเอง เมื่อมีการป้อนสนามไฟฟ้าให้กับสารพาราอิเล็กทริก ทำให้เกิดโพลาไรเซชันขึ้น แต่เมื่อยุดป้อนสนามไฟฟ้าเข้าไป ผลก็คือไม่มีการเกิดโพลาไรเซชันอีก ซึ่งเขียนความสัมพันธ์ได้ดังภาพ 6

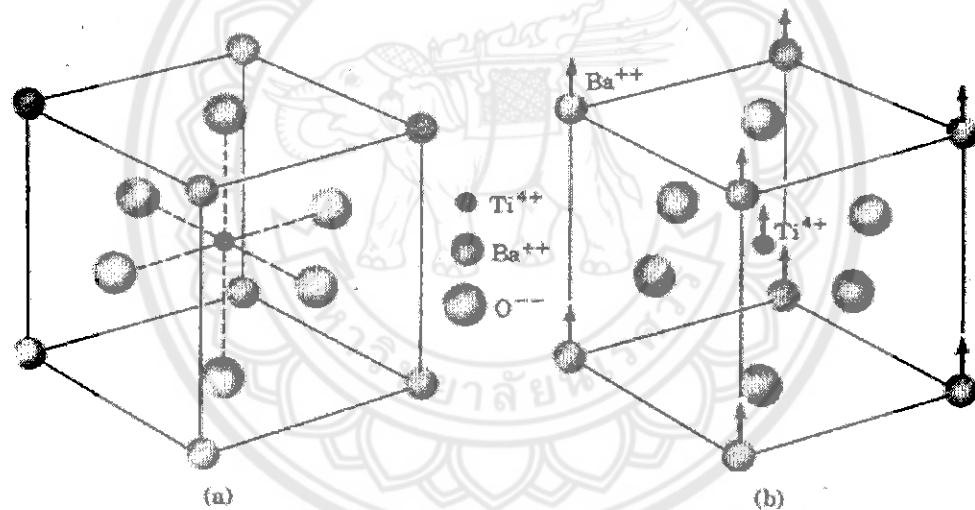


ภาพ 6 วงรอบอิสเทอร์ซิสระห่วงโพลาไรเซชันกับสนามไฟฟ้าในสารพาราอิเล็กทริก [18]

เพอรอพสไกท์เฟรโรอิเล็กทริก (perovskite ferroelectric)

เพอรอพสไกท์เฟรโรอิเล็กทริกเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดในบรรดาเฟรโรอิเล็กทริกด้วยกันและมีโครงสร้างพื้นฐานเป็นเพอรอพสไกท์ ซึ่งมีสูตรโครงสร้างว่า “ ABO_3 ” [33] ซึ่งโครงสร้างนี้สามารถอธิบายด้วยโครงสร้างคิวบิกอย่างง่ายได้ โดยธาตุ A ซึ่งเป็นแคตไอออน (cation) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด จะอยู่ที่ตั้งอยู่ที่มุมของ 8 ของรูปทรงคิวบิก ตัวอย่างเช่น Pb, Ca, Sr, Na และ K เป็นต้น ส่วนธาตุ B อยู่ที่ใจกลางของรูปทรงหกเหลี่ยม (octahedral) เป็นแคตไอออนที่มีขนาดเล็กที่สุด ได้แก่ Ti, Zr, Nb, Ta, W ฯลฯ และสุดท้ายแอนไอออน (anions) ของออกไซเจนห้อง 6 ตัวจะอยู่ที่บริเวณกึ่งกลางผิวน้ำ (face center) ของด้านรูปทรงคิวบิกห้อง 6 ด้าน ตัวอย่างสารประกอบที่มีโครงสร้างผลึกแบบเพอรอพสไกท์ เช่น $BaTiO_3$, $PbTiO_3$, $PbZrO_3$, $NaNbO_3$ และ $SrTiO_3$

ในแบบเรียมไททาเนต ซึ่งเป็นสารที่มีโครงสร้างเพอรอพสไกท์ชนิดแรก มี Ba^{2+} เป็นแคตไอออนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่มุมห้อง 8 ของกล่อง ส่วนแคตトイออน B เป็น Ti^{4+} มีขนาดเล็กที่สุด อยู่ที่ศูนย์กลางของกล่อง และถูกล้อมรอบด้วยแอนไอออนห้อง 6 ที่อยู่ในตำแหน่งกลางผิวน้ำและถูกเชื่อมโยงเป็นทรงออกอะไฮดรอลภายในกล่อง ดังภาพ 7

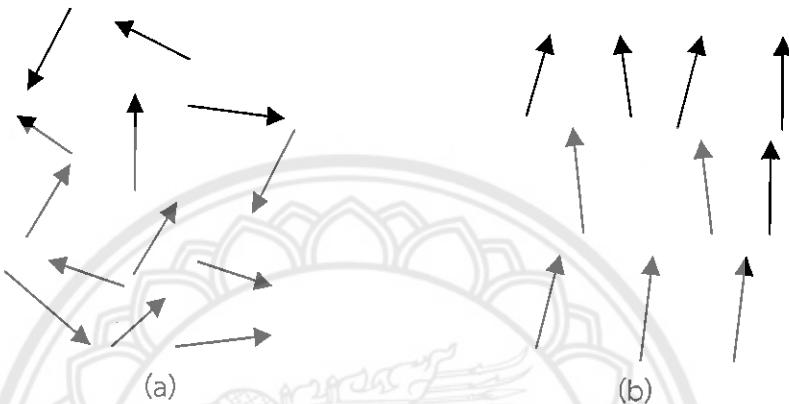


ภาพ 7 หน่วยเซลล์แบบเพอรอพสไกท์ (ABO_3) ของแบบเรียมไททาเนต [19]

เป็นที่ทราบกันแล้วว่า หากสารเฟรโรอิเล็กทริกได้รับอุณหภูมิมากกว่าอุณหภูมิคูรีของสารนั้นแล้ว สารดังกล่าวจะกล่าวสภาพเป็นพาราอิเล็กทริก โดยผลึกมีความสมมาตรกับจุดศูนย์กลางของหน่วยเซลล์ ผลที่ตามมาคือ สารจะไม่สามารถเกิดโพลาไรเซชันด้วยตนเองได้ และเมื่อลดอุณหภูมิตั้งกล่าวลงให้ต่ำกว่าอุณหภูมิคูรี สารดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนสภาพจากพาราอิเล็กทริกไปเป็นเฟรโรอิเล็กทริกเช่นเดิม ทำให้ที่ตำแหน่งศูนย์กลางมีการเปลี่ยนตำแหน่ง และโครงสร้างผลึกแบบคิวบิกจะเปลี่ยนเป็นโครงสร้างผลึกที่ไม่มีความสมมาตรกับศูนย์กลาง ตัวอย่างโครงสร้างดังกล่าว เช่น เทหะโภนิกซ์ (Tetragonal) รวมไปถึงรูบิโอล (rhombohedral) หรือโมโนคลินิก (monoclinic)

โพลาไรเซชัน (Polarization)

เมื่อเราพิจารณาสารเซรามิก ที่ประกอบด้วยผลึกก้อนเล็กๆ ที่มีทิศทางของไดโอลต่างกัน การที่ไดโอลไม่เรียงตัวเป็นระเบียบนี้ ทำให้เซรามิกไม่สามารถวัดค่าพิโซอิเล็กทริกได้แต่เมื่อมีการให้สนามไฟฟ้าเข้าไปในสารตัวอย่าง หรือการสร้างขึ้นให้แก่สาร (poling) นี้จะทำให้เกิดโพลาไรเซชัน หรือไดโอลภายในเนื้อสารอยู่ในทิศทางใกล้เคียงกัน หรือทิศทางเดียวกันกับทิศทางของสนามไฟฟ้าที่เข้าไปดังภาพ 8 เพื่อเพิ่มสมบัติการเป็นพิโซอิเล็กทริก และสมบัติทางไฟฟ้าด้วย [17]



ภาพ 8 ไดโอลภายในเนื้อสาร (a) ก่อนทำการ poling และ (b) หลังทำการ poling [17]

สมบัติไดอิเล็กทริก (Dielectric property)

วัสดุไดอิเล็กทริก เป็นชนิดหนึ่งของอนุวัติไม่นำไฟฟ้า และยังสามารถเก็บประจุไฟฟ้าได้อีกด้วย [20] ซึ่งค่าความสามารถในการกักเก็บประจุไฟฟ้าของสารไดอิเล็กทริก เรียกว่า ค่าความจุไฟฟ้า (Capacitance) เมื่อใส่สนามไฟฟ้าแก่สารไดอิเล็กทริก สารไดอิเล็กทริกจะเกิด polarization ขึ้นซึ่งเท่ากับ ค่าผลรวมของโพลาไรเซชันต่อหน่วยปริมาตร (net polarization/unit volume) ซึ่งถ้าค่า polarization สูงก็จะส่งผลให้สารไดอิเล็กทริกมีค่า capacitance สูงตามไปด้วย โดยสมบัติทางไดอิเล็กทริกมีพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องหั้งමด 3 ตัว คือ ค่าสภาพยอมสัมพัทธ์ (relative permittivity: ϵ_r) ความคงทนไดอิเล็กทริก (dielectric strength) และค่าสูญเสียไดอิเล็กทริก (dielectric loss)

ค่าสภาพยอมสัมพัทธ์ (Relative permittivity: ϵ_r)

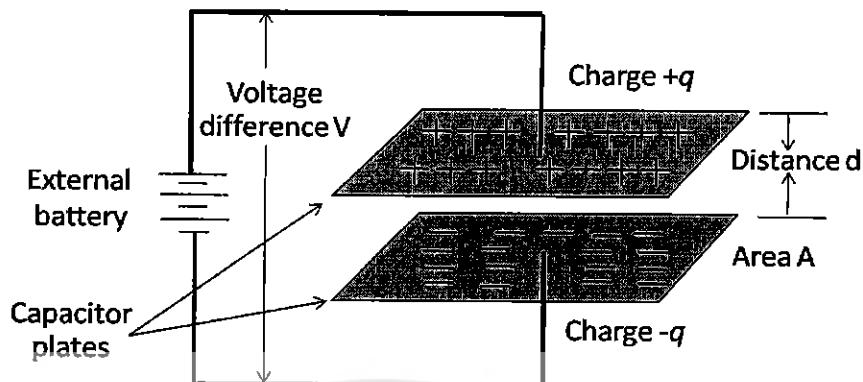
พิจารณาตัวเก็บประจุอย่างง่ายคือ แผ่นนานาที่ทำด้วยโลหะโดยวางห่างกันด้วยระยะ d พื้นที่ของแผ่นเท่ากับ A ดังแสดงในภาพ 9 ระหว่างแผ่นนานาเป็นสูญญากาศ เมื่อมีศักย์ไฟฟ้า V คร่อมแผ่นนานาโดยที่แผ่นโลหะแผ่นประจุ $+Q$ และอีกแผ่นหนึ่งจะเป็นประจุ $-Q$ ค่าประจุนี้จะเป็นสัดส่วนกับ V ดังสมการ 8 [20]

$$Q = CV \quad (8)$$

หรือ

$$C = \frac{Q}{V} \quad (9)$$

เมื่อ C คือ (capacitance) มีหน่วยเป็น คูลومบ์ต่อโวลต์ (C/V) หรือ พารัด (F)



ภาพ 9 ตัวเก็บประจุแผ่นขาน [20]

ความจุไฟฟ้าบวกถึงความสามารถในการกักเก็บประจุ ยิ่งมีความจุไฟฟ้ามากเท่าไหร่ยิ่งเก็บประจุได้มากเท่านั้น ถ้าหากตัวเก็บประจุมีขนาดพื้นที่ขนาดมากกว่าระยะห่างระหว่างแผ่นขานมากๆ จะได้ว่าความจุไฟฟ้ามีค่าดังสมการ (10)

$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d} \quad (10)$$

ϵ_0 คือ ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกค่าสภากายอมสัมพัทธ์ (permittivity) ในสุญญากาศ มีค่า

8.854×10^{-12} พารัดต่อเมตร F/m

A คือ พื้นที่ของไดอิเล็กทริก มีหน่วยเป็นตารางเมตร (m^2)

C คือ ค่าความจุไฟฟ้า มีหน่วยเป็นพารัด (F)

d คือ ความหนาของสารไดอิเล็กทริก มีหน่วยเป็นเมตร (m)

ในกรณีที่มีสารไดอิเล็กทริกทางอยู่ระหว่างแผ่นขาน ความจุไฟฟ้าจะมีค่าเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเท่าซึ่งเท่ากับค่าสภากายอมสัมพัทธ์ (Relative permittivity) หรือที่เรียกว่าค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (dielectric constant) ของเซรามิก ดังสมการ 11

$$C = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 A}{d} \quad (11)$$

เมื่อ ϵ_r คือ ค่าสภากายอมสัมพัทธ์ (Permittivity) ในสุญญากาศ โดยมีค่าประมาณ

8.854×10^{-12} พารัดต่อเมตร F/m

การมีสารไดอิเล็กทริกอยู่ในตัวเก็บประจุจะช่วยเพิ่มพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุให้สามารถสร้างตัวเก็บประจุขนาดเล็กแต่ความจุไฟฟ้าสูงได้ ความคงทนไดอิเล็กทริก (Dielectric strength) ความคงทนไดอิเล็กทริก เป็นสมบัติสำคัญอย่างหนึ่งในการประเมินคุณภาพของได อิเล็กทริกเป็นปริมาณที่บ่งบอกถึงความทนทานต่อความด่างศักย์ของไดอิเล็กทริก ความคงทนได อิเล็กทริกมีค่าเท่ากับศักย์ไฟฟ้าสูงสุดที่ไดอิเล็กทริกยังคงใช้งานได้ โดยปราศจากความเสียหายต่อความพยายามนี้ หน่วย ถ้าวัสดุไดอิเล็กทริกถูกป้อนด้วยความค่าความด่างศักย์ที่สูงมากๆ อาจจะทำให้แฟกเตอร์สูญเสีย พลังงาน (Energy loss factor) ถ้าป้อนความด่างศักย์ไฟฟ้าให้แก่ สารไดอิเล็กทริกที่ไม่มีการสูญเสีย พลังงานเลย ศักย์ไฟฟ้าซึ่งมีรูปคลื่นแบบชายัน แบบเดียวกับไฟฟ้ากระแสสลับ กระแสไฟฟ้าจะนำหน้าศักย์ไฟฟ้าซึ่งมีรูปคลื่นแบบชายัน แบบเดียวกับไฟฟ้ากระแสสลับ กระแสไฟฟ้าจะนำหน้าศักย์ไฟฟ้าอยู่ 90 องศา แต่ในความเป็นจริงนั้น สำหรับไดอิเล็กทริกทั่วไป มุมด่างไฟจะน้อยกว่า 90 องศา เสมอ ถ้าให้ δ คือค่ามุมที่นำไปลบออกจาก 90 องศา ปริมาณ $\tan \delta$ จะหมายถึง แฟกเตอร์สูญเสียพลังงานในไดอิเล็กทริกของตัวเก็บประจุเมื่อใช้งานกับวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

การซินเตอร์

การซินเตอร์แบบสถานะของแข็ง

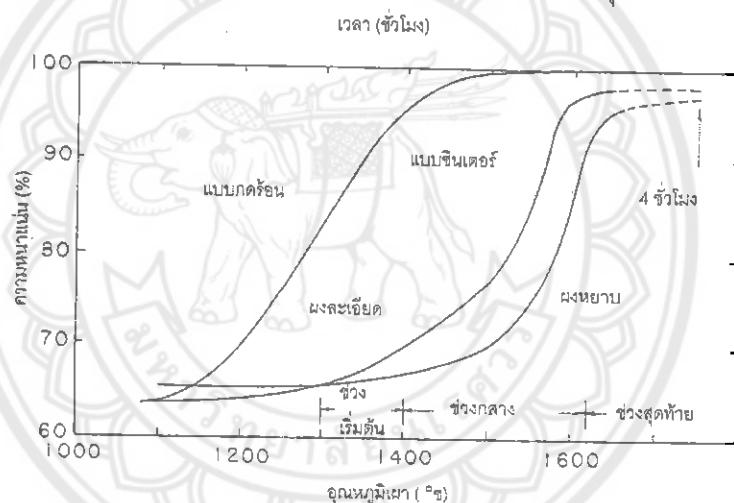
การซินเตอร์ (sintering) คือ การกระบวนการทางความร้อนที่ทำให้ออนุภาคเกิดการสร้างพันธะ กันอย่างสมดล โดยมีโครงสร้างหลักเป็นของแข็ง ที่พัฒนาจากการเคลื่อนย้ายมวลลักษณะ ต่าง ๆ ที่มักจะเกิดขึ้นในระดับของอะตอม การเกิดพันธะเชื่อมต่อกันดังกล่าวทำให้ระบบมีความแข็งแรง สูงขึ้นและมีพลังงานลดลง นอกจากนี้ยังอาจกล่าวได้ว่าการซินเตอร์นั้น หมายถึงการกำจัดรูพรุนที่อยู่ระหว่างอนุภาคผงเริมต้น โดยอาศัยการหดตัวขององค์ประกอบที่เชื่อมอยู่ติดกันแล้วเกิดการเติบโต ไปด้วยกัน โดยมีการสร้างพันธะที่แข็งแรงระหว่างอนุภาคที่อยู่ติดกันขึ้นมาทุกขั้นตอนที่อยู่ระหว่าง การเปลี่ยนสภาพขั้นงานที่ผ่านการอัดขึ้นรูป ไปเป็นโครงสร้างจุลภาคที่ประกอบด้วยการยึดเกาะกัน ของเกรนต่าง ๆ ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการซินเตอร์ทั้งสิ้น แรงขับดันสำหรับการซินเตอร์นั้น ได้มาจากกราดพื้นที่ผิวและพลังงานของพื้นผิวด้วยการใช้ของแข็งที่เชื่อมยึดกันโดยมีพลังงานของ เกรนแบบของแข็ง-ของแข็ง (γ_{gb}) ที่ค่อนข้างต่ำเข้าไปแทนที่กลุ่มอนุภาคผงที่ยึดกันอยู่อย่างหลวม ๆ ซึ่งจะมีพลังงานพื้นผิวแบบของแข็ง-ไอ (γ_{sv}) ที่สูงมาก ด้วยเหตุนี้ของการผลิตเซรามิกส่วนใหญ่จึงนิยม เลือกใช้ออนุภาคผงตั้งตันที่มีขนาดอนุภาคเล็ก เนื่องจากอนุภาคผงที่มีขนาดยิ่งเล็กเท่าไรก็จะยิ่งมีพื้นที่ ผิวมากขึ้นเท่านั้น จึงทำให้ระบบมีแรงขับดันสำหรับการซินเตอร์ที่สูงขึ้นตามไปด้วย ทำให้ขั้นงาน สามารถเกิดการแน่นตัวได้ดี จึงมีความหนาแน่นสูง หรือทำให้สามารถใช้อุณหภูมิในการเผาที่ต่ำลงได้ [21]

การหดตัวของขั้นงานเซรามิกชนิดที่ทำการซินเตอร์สามารถตรวจสอบได้จากการวัดขนาด หรือหาค่าความหนาแน่นของขั้นงานขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และเวลาในการเผา ตั้ง เช่น ตัวอย่างของพฤติกรรมการซินเตอร์แบบสถานะของแข็ง (solid - state sintering) ทั่ว ๆ ไป ที่แสดงดังภาพ 10 ซึ่งประกอบไปด้วย ขั้นตอนหลักที่มีความควบคุมต่อเนื่องกันอยู่คือ

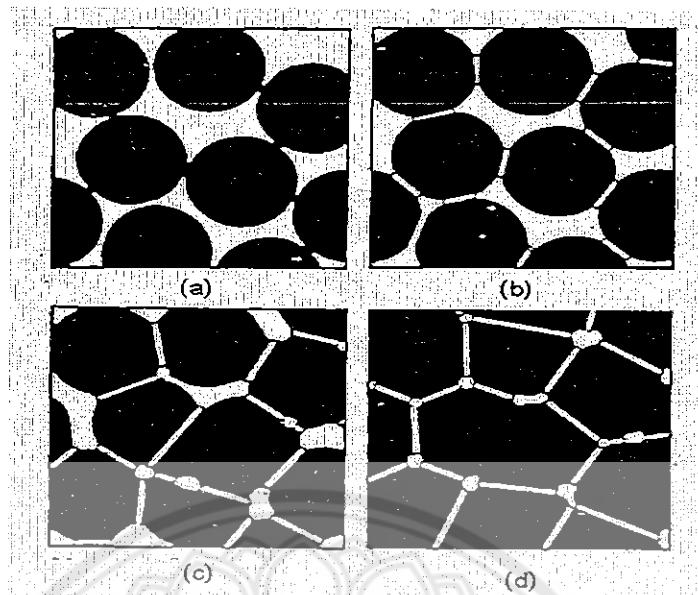
1. การซินเตอร์ช่วงเริ่มต้น (initial sintering) จะเกี่ยวข้องกับการจัดเรียงตัวกันใหม่อีครั้ง หนึ่งของอนุภาคผงภายในขั้นงานและการเกิดพันธะที่แข็งแรง หรือคอ (neck) ขึ้นมาที่บริเวณจุดสัมผัส

ระหว่างอนุภาคผง ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของชิ้นงานในช่วงนี้อาจจะเพิ่มขึ้นจาก 0.5 ไปถึง 0.6 ได้ส่วนใหญ่ก็เนื่องมาจากการที่อนุภาคผงมีการแพคตัวกันมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ภาพ 11 (b) การซินเตอร์ช่วงกลาง (intermediate sintering) เป็นช่วงที่ขนาดของคอเริ่มโตขึ้นและปริมาณของความพรุนในชิ้นงานจะเริ่มลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากอนุภาคเริ่มเข้ามาใกล้ติดกันมากยิ่งขึ้น ทำให้ชิ้นงานเกิดมีการหดตัวลงอย่างชัดเจน เริ่มมีเกรนและขอบเกรนเกิดขึ้นพร้อมกับมีการเคลื่อนที่ของสิ่งเหล่านี้ ทำให้เกิดมีการเติบโตของเกรนบางเกรนขึ้น ขั้นตอนนี้จะดำเนินไปเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่องในขณะที่ช่องว่างของรูพรุนจะเริ่มเกิดการเชื่อมต่อกัน (พวกรูพรุนเปิด) และจะสิ้นสุดพฤติกรรมนี้ในทันทีเมื่อรูพรุนเกิดมีการแยกตัวหลุดออกไปอยู่ต่างหาก (พวกรูพรุนปิด) การหดตัวของชิ้นงานจะเกิดขึ้นมากที่สุดในการซินเตอร์ช่วงกลางนี้ และอาจจะทำให้ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของชิ้นงานมีค่าสูง(ภาพ 11 (c))

2. การซินเตอร์ช่วงสุดท้าย(final stage sintering) เป็นช่วงที่รูพรุนในชิ้นงานเริ่มปิดตัวเองลงและค่อยๆ ถูกกำจัดให้หมดไปจากชิ้นงานอย่างช้าๆ โดยอาศัยกลไกการแพร์ของอากาศจากรูพรุนออกตามแนวของขอบเกรน และหลุดออกไปจากผิวของชิ้นงาน ซึ่งจะทำให้ชิ้นงานเกิดการแน่นตัวเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกเล็กน้อย ขนาดของเกรนจะเพิ่มขึ้นในการซินเตอร์ช่วงสุดท้ายนี้ ภาพ 12 (d)



ภาพ 10 พฤติกรรมการซินเตอร์แบบสถานะของแข็งทั่วๆ ไปในรูปของความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกับอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการเผา [21]



ภาพ 11 พัฒนาการของโครงสร้างจุลภาคที่เกิดจากการซินเตอร์แบบสตานะของแข็ง (a) อนุภาคนยีดกันอยู่แบบหลวมๆ หลังการอัดขึ้นรูป (b) การซินเตอร์ช่วงเริ่มต้น (c) การซินเตอร์ช่วงกลาง และ (d) การซินเตอร์ช่วงสุดท้าย [21]

การซินเตอร์แบบมีเฟสของเหลว

การซินเตอร์แบบมีเฟสของเหลว(liquid phase sintering)เป็นกระบวนการเผาซินเตอร์ที่มีองค์ประกอบหนึ่งของวัสดุเกิดการหลอมเหลวขึ้นจนถาวรสภาพไปเป็นของเหลวในระหว่างที่มีการซินเตอร์ ซึ่งเป็นกระบวนการอันหนึ่งที่นิยมใช้ในการผลิตเซรามิก ด้วยการใช้อุณหภูมิเผาซินเตอร์ที่ต่ำลง เนื่องจากโดยปกติแล้ววัสดุพอกเซรามิกส่วนใหญ่จะมีจุดหลอมเหลวที่สูงมากบางชนิดอาจสูงถึงประมาณ 1300 องศาเซลเซียส ทำให้ต้องมีการใช้พลังงานที่สูงมากในการเผาซินเตอร์ผลิตภัณฑ์เหล่านี้และมีเวลาเผาอยู่ไม่กี่ประเภทที่สามารถใช้งานภายใต้เงื่อนไขนี้ได้ นอกจากนี้ยังเป็นการเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาเรื่องปฏิกิริยาระหว่างสารในภาชนะที่หลอมตัว กับภาชนะเองได้ง่ายอีกด้วย ดังนั้นจึงมีการพัฒนาเทคนิคการผลิตเซรามิกเหล่านี้ที่อุณหภูมิต่ำลงด้วยการใช้สารช่วยหลอมหรือฟลักซ์ (fluxes) ซึ่งเป็นอนุภาคนยีดที่เติมลงไปเพื่อทำหน้าที่ช่วยให้ขั้นงานเกิดการหลอมเหลวที่ต่ำกว่าสารองค์ประกอบหลักของผลิตภัณฑ์มาก จึงเกิดเป็นเฟสที่เป็นของเหลวให้เคลื่อนย้ายที่ในระหว่างการซินเตอร์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

กระบวนการซินเตอร์แบบมีเฟสของเหลวมีอยู่สองระบบคือ

- ระบบที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อขั้นงานได้รับความร้อนจนกระทั่งถึงอุณหภูมิของการซินเตอร์จะมีเฟสที่เป็นของเหลวเกิดขึ้นและคงสภาพอยู่ตลอดช่วงของการซินเตอร์และเมื่อขั้นงานเริ่มเย็นตัวลงเฟสที่เป็นของเหลวนี้จะเกิดการแข็ง ตัวแยกเฟสอยู่ในขั้นงาน

2. ระบบที่มีความเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อซึ่งกันได้รับความร้อนจนกระหั่งถังอุณหภูมิของการซินเตอร์จะมีเฟสที่เป็นของเหลวเกิดขึ้นแล้วค่อย ๆ หายไปช้า ๆ ด้วยการละลายลงไปอยู่ในเมทริกซ์ของซึ่งกัน

กระบวนการซินเตอร์ที่มีเฟสของเหลวประกอบด้วย 4 ระยะหลักดังนี้

1. ระยะที่อนุภาคมีการจัดเรียงตัวกันใหม่ (particle rearrangement stage) หลังจากที่มีการหลอมเหลวเกิดขึ้นอนุภาคของแข็งจะถูกแรงดันรูดลากออกจากของเหลวเดิมเข้าการกัน ทำให้ซึ่งกัน เกิดมีการหล่อตัวอย่างรวดเร็ว และมีการกำจัดรูพรุนออกไปจากซึ่งกัน

2. ระยะที่อนุภาคมีการแยกออกจากกันแล้วเกิดการตกตะกอนช้า (dissolution reprecipitation stage) มีหลายกรณีที่อนุภาคของแข็งสามารถละลายในเฟสที่เป็นของเหลวได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งความโค้งของอนุภาคของแข็งและความดัน ณ จุดสัมผัสระหว่างอนุภาคของแข็งจะช่วยทำให้เกิดมีการแยกออกจากกันของอนุภาคได้ เมื่อเกิดมีการละลายขึ้น ตัวถูกละลายจะแพร่เข้าสู่จุดที่มีความคงตัวของขั้นตอนภายในโครงสร้างจุลภาค และเกิดการตกตะกอนจนทำให้เกรนบริเวณดังกล่าวมีขนาดโตขึ้นซึ่งตัวที่ตกตะกอนอาจจะไม่ได้เป็นตัวเดียวกันกับอนุภาคของแข็งเริ่มต้นก็ได้แต่อาจจะเป็นตัวใหม่ที่มีองค์ประกอบของห้องที่ได้จากเฟสที่เป็นของแข็งและที่เป็นของเหลวอยู่ร่วมกัน ซึ่งการตกตะกอนในลักษณะดังกล่าวนี้จะทำให้ปริมาณเฟสของเหลวที่เกิดขึ้นในระบบลดลงขณะที่มีการตกตะกอน

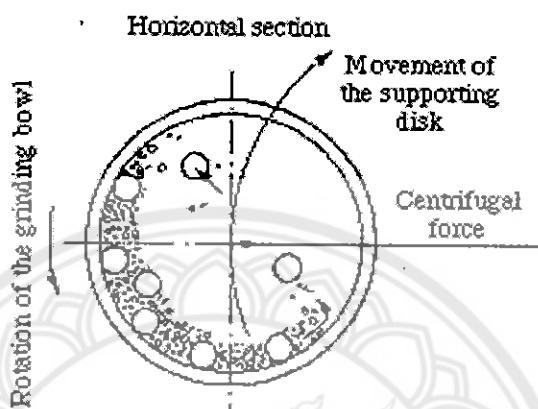
3. ระยะที่ของเหลวมีการสماโนลักษณ์ (liquid assimilation) ในบางกรณีของเหลวจะเข้าไปปะปนอยู่ร่วมกับเฟสที่เป็นของแข็งได้โดยตรงด้วยการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีหรืออาจเข้าไปแทรกอยู่ด้วยแรงกล จนทำให้เกิดการเป็นของแข็งที่อยู่ในรูปของสารละลายของแข็งที่เกิดจากการดูดซับของเหลวหรือเกิดเฟสใหม่ที่ตกผลึกมาจากสารที่เกิดการหลอม

4. ระยะการเติบโตของเกรนในสถานะของแข็ง (solid state grain growth stage) เมื่อของเหลวถูกรีดออกมากจากอนุภาคที่อัดกันแน่น หรือมีการแพร่ซึมเข้าไปอยู่ภายในของแข็งจะทำให้เกิดมีขอบเกรนปรากฏขึ้นมา ซึ่งถ้าหากระบบยังมีการซินเตอร์อยู่ก็จะมีพฤติกรรมการเติบโตของเกรนเป็นขั้นตอนหลักที่ค่อยควบคุมพฤติกรรมของการซินเตอร์ต่อไป

การบดย่อยด้วยลูกบด (Ball milling)

เป็นกระบวนการบดย่อยอนุภาคของวัตถุดิบที่อาศัยการหมุนหม้อบด ซึ่งเป็นแท่งกลวงทรงกระบอกที่มีฝาปิด-เปิดได้อยู่ที่ปลายด้านหนึ่ง ในแนวอน หม้อบดส่วนใหญ่ที่นิยมใช้งานกันในระดับห้องปฏิบัติการ มักจะทำด้วยกระป่องพลาสติกแบบง่าย ๆ ที่มาสามารถกำจัดเศษพลาสติกที่ปนเปื้อนมากับการบดย่อยได้ด้วยการเผาที่อุณหภูมิต่ำ หรือในบางกรณีก็จะใช้หม้อบดเซรามิกที่ทำด้วยพอร์เชเลน ก่อนที่จะทำการหมุนหม้อบดจะต้องมีการใส่วัตถุดิบที่ต้องการจะลดขนาด หรือที่เรียกว่า ประจุ (charge) พร้อมกับลูกบด (ball) หรือลูกบด (grinding media) และสารเติมแต่งอื่น ๆ เช่นสารเจือ หรือสารช่วยหล่อลื่น เป็นต้น ลงไปในปริมาณที่เหมาะสมกับขนาดของหม้อบดโดยจะต้องพยายามปรับอัตราส่วนขององค์ประกอบเหล่านี้ในหม้อบด ให้ระบบหั้งชุดสามารถเกิดพฤติกรรมการบดย่อย กล่าวคือ ลูกบดจะต้องมีการเคลื่อนที่คล้าย ๆ กับตัวอักษร D โดยมีการเคลื่อนที่ไถเฉียงกันจากตำแหน่ง B ขึ้นไปจนถึงตำแหน่ง A แล้วตกลงมากระแทกกับวัสดุด้านล่าง จากนั้นก็มีการหมุน

เบี่ยงเสียดกัน และมีการเลื่อนไหลเป็นวัฏจักรเช่นนี้เรื่อยไป ทำให้อนุภาคของวัตถุดิบมีขนาดลดลง เนื่องจากผลกระทบด้วยลูกบด ถูกขัดสีรีหรือห่างลูกบด และระหว่างลูกบดกับผนังของหม้อบด ในขณะที่พุติกรรมต่าง ๆ เหล่านี้สามารถช่วยทำให้ขนาดของอนุภาคลดลง การเกิดสิ่งเจือปนก็อาจจะมีขึ้นในขั้นตอนเหล่านี้ เช่นกันไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนของลูกบด หรือผนังของหม้อบดที่สึกกร่อนหลุดแปบเข้ามาด้วย [22, 23]

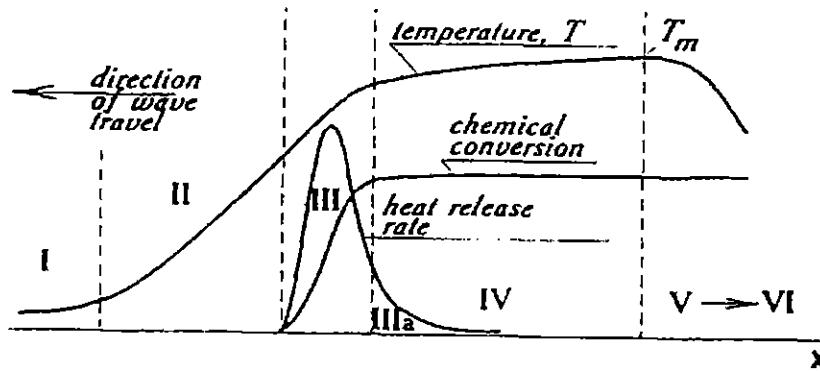


ภาพ 12 ภาพตัดขวางแสดงองค์ประกอบหลักของการบดย่อยด้วยลูกบด (ball-milling)
และแสดงลักษณะพุติกรรมการบดย่อยแบบเลื่อนหล่นกันไป (cascading) [23]

การเตรียมเซรามิกด้วยวิธีการการเผาใหม่

การใช้ประโยชน์จากการผลิตปล่องพลังงานความร้อนที่ได้จากปฏิกิริยาเคมีในขั้นตอนการผลิต มีการใช้กันมานานแล้วตั้งแต่ศตวรรษที่ผ่านมา เมื่อ Beketov และ Goldshmidt ได้ค้นพบ self-sustaining thermite reaction ซึ่งต่อมาก็ได้ใช้หลักการจุดระเบิดของปฏิกิริยาเคมีในกระบวนการผลิตอย่างมากมาย เช่น ในกระบวนการผลิตเทาหโลมเหล็ก การผลิตเฟอร์โรอัลลอย ฯลฯ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาทฤษฎีการเผาใหม่ (combustion) ยุคใหม่ไม่ได้มีรูปแบบอย่างที่เคยปฏิบัตามาในปี ค.ศ. 1930-1940 สำหรับแก๊ส และปี ค.ศ. 1950-1960 สำหรับของเหลว (ในปี ค.ศ. 1967 ได้มีการค้นพบปราภูภารณ์จุดระเบิดของของแข็ง ซึ่งปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจะได้ผลผลิตในสถานะของแข็ง และการพัฒนาวิธีการเผาใหม่บนพื้นฐานของ self-propagation high-temperature (SHS) ได้กระตุ้นให้เกิดการทดลองและการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการเผาใหม่ของสารประกอบอนินทรีย์และวัสดุอย่างกว้างขวาง ซึ่งผลของข้อมูลที่ได้จากการทดลองได้ถูกนำไปใช้เป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีการเผาใหม่และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

กระบวนการการเผาใหม่มีการใช้งานกันอย่างกว้างขวาง สำหรับสัดส่วนสูงและกระบวนการผลิตเพื่อการประยุกต์พลังงาน ในปัจจุบันการควบคุมความเร็วของการจุดระเบิด อุณหภูมิ สัดส่วน และโครงสร้างของผลผลิตทำได้โดยการประยุกต์แนวคิดแผนใหม่ของทฤษฎีการเผาใหม่และโครงสร้างพลาสตurm ทันภาค ของปฏิกิริยาเคมี ซึ่งสามารถอธิบายกระบวนการทั่วไปของ การเผาใหม่ ได้ดังภาพ 13

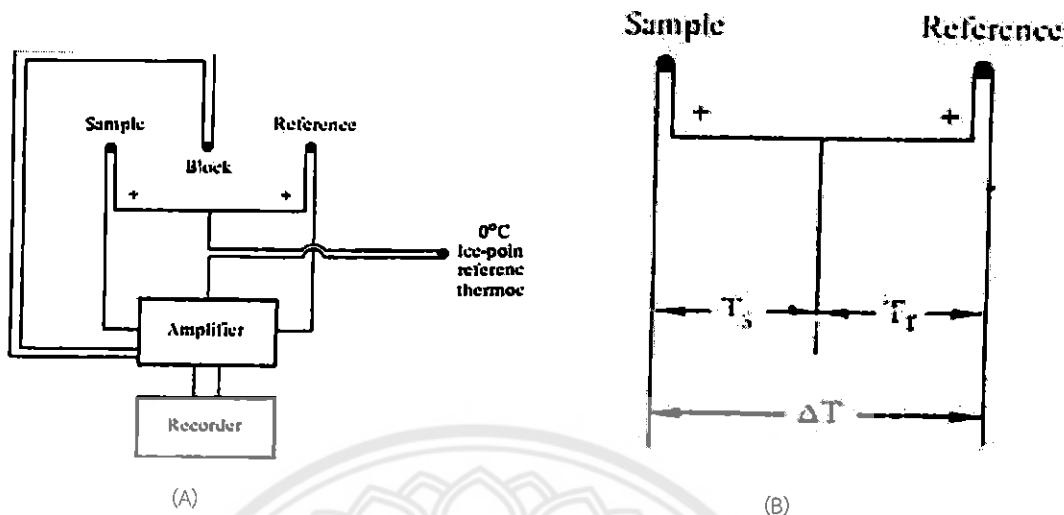


ภาพ 13 การเปลี่ยนแปลงของกระบวนการการเผาไหม้ [24]

ช่วงที่หนึ่ง เป็นช่วงเริ่มต้นของปฏิกิริยา ช่วงที่สอง เป็นช่วงก่อนที่จะเกิดปฏิกิริยา ซึ่งช่วงนี้จะยังไม่มีปฏิกิริยาเกิดขึ้น แต่จะมีการถ่ายเทความร้อนเพิ่มมากขึ้น ช่วงที่สาม เป็นช่วงที่มีความสำคัญต่อโครงสร้างของวัสดุ โดยจะมีการลดปล่อยพลังงานความร้อนออกมามีการเกิดการจุดระเบิด และความร้อนที่ปลดปล่อยออกมานี้จะแพร่ไปสู่ช่วงต้นของช่วงที่สี่ คือ ช่วงการเปลี่ยนแปลงทางเคมี (chemical conversion) ส่วนที่ก้าวที่สุดของช่วงนี้ คือ ส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงไฟส์และโครงสร้างของวัสดุ ซึ่งขั้นตอนนี้จะเป็นตัวกำหนดโครงสร้างสุดท้ายและมีบทบาทสำคัญต่อสมบัติของวัสดุ ในช่วงที่ห้าของกระบวนการ เป็นช่วงที่วัสดุเกิดการเย็นตัว และในช่วงนี้อาจมีผลกระทบต่อโครงสร้างของวัสดุ ถ้าการเย็นตัวเกิดขึ้นอย่างช้าๆ จะทำให้ได้โครงสร้างของวัสดุที่สมดุล ดังนั้นในกระบวนการการเผาไหม้ อัตราการให้ความร้อนจะเป็นตัวกำหนดรูปแบบของการปลดปล่อยความร้อนและถ่ายเทความร้อนไปสู่ช่วงการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ส่วนคุณลักษณะของวัสดุที่ได้จะขึ้นอยู่กับไฟส์ โครงสร้าง เงื่อนไข และอัตราการเย็นตัวของวัสดุ [24-26]

การวิเคราะห์เชิงความร้อนด้วยเครื่อง Differential Thermal Analysis (DTA)

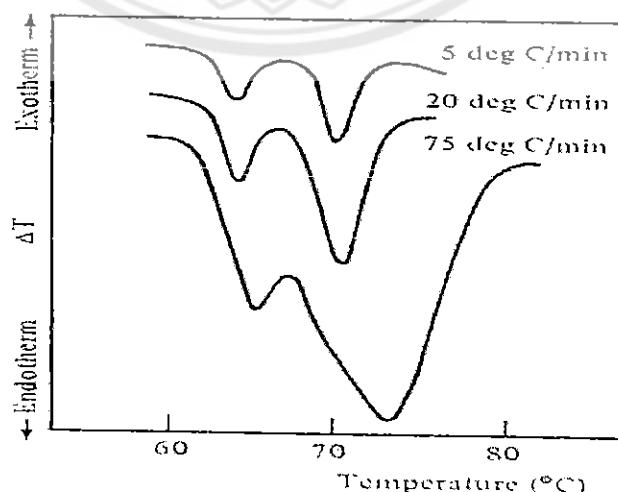
DTA เป็นเครื่องมือวิเคราะห์เชิงความร้อน โดยวัดออกมานิรูปของอุณหภูมิที่ต่างกันระหว่างสารตัวอย่างกับสารอ้างอิงในระหว่างให้ความร้อนอุณหภูมิของตัวอย่างเปลี่ยนแปลงในลักษณะการดูด (Endothermic) หรือการรายความร้อน (Exothermic) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานภายใน (Enthalpy transition) เช่น จากการเปลี่ยนไฟส์ การละลาย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผลึก การเดือด การเผาไหม้ การระเหย การคายน้ำ การแตกตัว กระบวนการ Oxidation Reduction และปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจะถูกตรวจวัด (ดังภาพ 14(A), 14(B)) ค่าความแตกต่างของอุณหภูมิของตัวอย่าง (T_s) และวัสดุอ้างอิง (T_r) จะถูกบันทึกเป็นกราฟดังตัวอย่างแสดงในภาพ 14 [27]



ภาพ 14 วงจรของเครื่อง DTA [27]

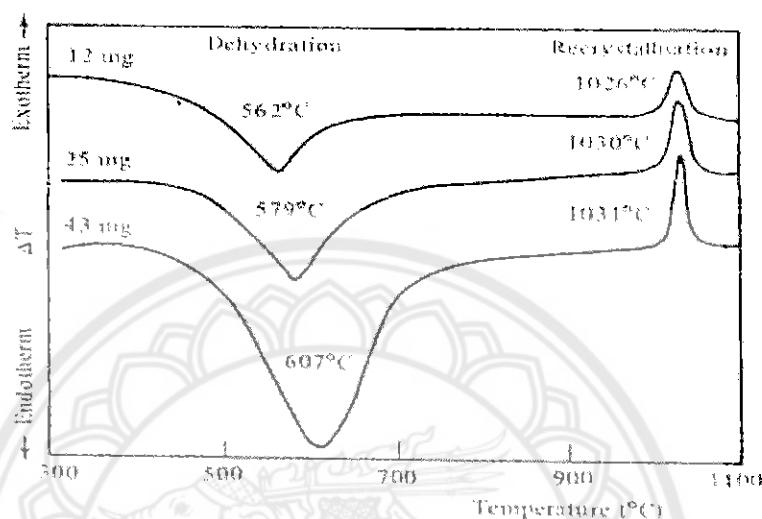
DTA ประกอบด้วย

- เครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermocouple) นิยมใช้ Pt – Pt / Rh หรือ Ni – Ni / Cr เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1 – 0.3 mm.
- ถ้วยใส่ตัวอย่าง และสารอ้างอิง ทำ จำกวัสดุที่มีสมบัติเดียวกันต่อการเปลี่ยนแปลงในช่วงอุณหภูมิที่ทดลอง และมีค่า Thermal Conductivity สูงเพื่อให้สามารถนำ ความร้อนสู่ตัวอย่างหรือสารอ้างอิงได้ดี
- ห้องควบคุมบรรยายการในการทดลองปัจจัยที่มีผลต่อการวิเคราะห์ ได้แก่
 - อัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ที่ใช้ในการทดลองมักอยู่ในช่วง 2 – 20 °C/นาที การเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจะลด Resolution แต่จะเพิ่มพื้นที่ของกราฟ (Peak) ดังตัวอย่างแสดงในภาพ 8 ส่วนการลดอัตราในการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ จะลดพื้นที่ของกราฟ



ภาพ 15 ผลของการเปลี่ยนแปลงอัตราการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิต่อกราฟ [27]

3.2 ปริมาณและสภาพของตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองของ DTA การเปลี่ยนแปลงปริมาณของตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง จะมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี และปฏิกิริยาทางพิสิกส์แตกต่างกัน ตัวอย่างแสดงดังภาพ 15



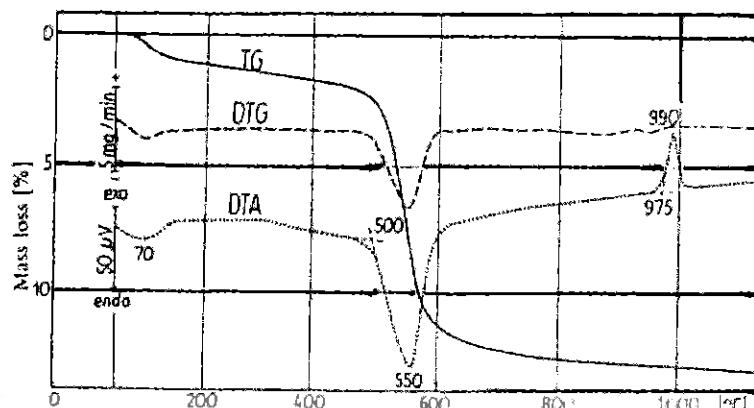
ภาพ 16 ผลของการเปลี่ยนแปลงปริมาณของตัวอย่างต่อกราฟ [27]

จากการจะเห็นว่าการเพิ่มปริมาณของตัวอย่างจาก 12 mg เป็น 43 mg อุณหภูมิการเกิดปฏิกิริยาเคมี (Dehydration) จะเพิ่มขึ้น 45°C ในขณะที่อุณหภูมิที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางพิสิกส์ (Recrystallisation) เพิ่มขึ้นเพียง 5°C นอกจากนี้การเพิ่มปริมาณของตัวอย่างทำให้พื้นที่ได้กราฟเพิ่มขึ้นด้วย ในส่วนของขนาดอนุภาค (Particle Size) การอัดแน่น (Packing) และความหนาแน่น (Density) ของตัวอย่าง มีผลต่อ ความสามารถในการนำ ความร้อน (Thermal Conductivity) ของตัวอย่าง หรือความสามารถในการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างตัวอย่างกับสภาพแวดล้อมซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเกิดปฏิกิริยาระหว่างของแข็งและแก๊ส (Solid – Gas Reaction)

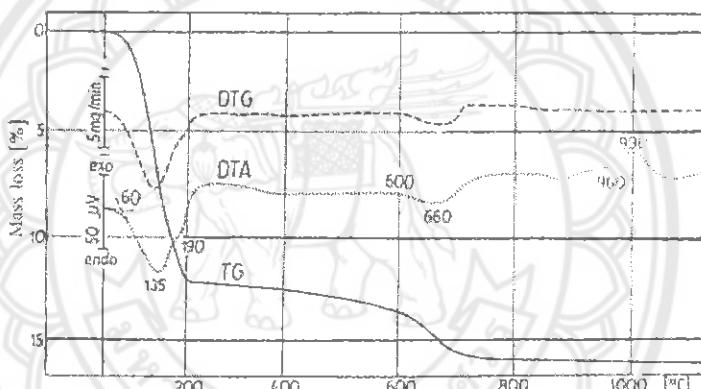
3.3 การเลือกสารอ้างอิงสารอ้างอิงมีสมบัติทางด้านความร้อน (Specific heat Conductivity) ใกล้เคียงกับ สารตัวอย่าง และควรเป็นสารเอ้อยในทุกช่วงอุณหภูมิของการทดลอง การเลือกสารอ้างอิงผิดประเภททำไปสู่ความคลาดเคลื่อนของ Base line อะลูมีนา (Alumina) เป็นวัสดุที่นิยมใช้เป็นสารอ้างอิง นอกจากนี้ยังมี fused quartz , glass beads หรือ liquid paraffin สารอ้างอิง ที่เป็นของเหลวจะใช้เมื่อตัวอย่างเป็นของเหลว

การใช้ประโยชน์ของเครื่อง DTA

DTA สามารถใช้วิเคราะห์เพื่อวัดถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น ใช้วิเคราะห์หาส่วนประกอบของตัวอย่าง ความบริสุทธิ์ของตัวอย่าง การสร้าง Plan Diagrams เป็นต้น ตัวอย่างผลวิเคราะห์จากเครื่อง DTA แสดงเป็นกราฟภาพ 17 และ 18



ภาพ 17 ผลวิเคราะห์แสดงค่าเป็นกราฟ DTA, TG, DTG ของดิน Kaolin [27]



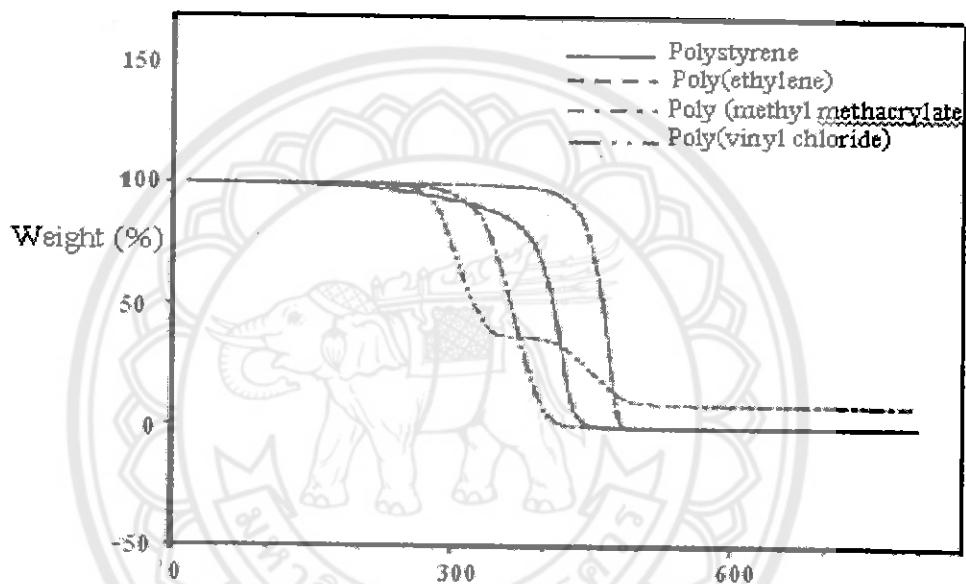
ภาพ 18 ผลวิเคราะห์แสดงค่าเป็นกราฟ DTA, TG, DTG ของดิน Bentonite [27]

ภาพ 17 แสดงผลวิเคราะห์เป็นกราฟ DTA, TG, DTG ของดิน Kaolin Peak ที่อุณหภูมิ 70°C และ 550°C แสดงกระบวนการดูดความร้อน เนื่องจากความชื้นระเหยออกไปและสูญเสียน้ำ ในโครงสร้างผลึก น้ำหนักที่หายไปสามารถนำมาคำนวณหาระบimitation และปริมาณน้ำ เมื่อโครงสร้างผลึกสูญเสียน้ำจะเปลี่ยนเป็น Metakaolinite และที่อุณหภูมิ 980°C เกิดกระบวนการคายความร้อน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผลึก Spinel และ ภาพ 18 แสดงผลวิเคราะห์ของ Bentonite การสูญเสียน้ำที่อยู่ระหว่างชั้นจะประगูทที่อุณหภูมิ 135°C และ 190°C การสูญเสียน้ำในโครงสร้างจะประกูทที่อุณหภูมิ $500 - 730^{\circ}\text{C}$ และกระบวนการคายความร้อนของการเกิดผลึก Spinel ที่อุณหภูมิ 990°C

หมายเหตุ DTG อัตราการสูญเสียน้ำหนักที่อุณหภูมิต่างๆ
TG น้ำหนักของสารตัวอย่างที่อุณหภูมิต่างๆ

Thermo gravimetric Analysis (TGA)

TGA เป็นวิธีเบื้องต้นในการวิเคราะห์ความเสถียรของพอลิเมอร์เมื่อได้รับความร้อน โดยใช้พื้นฐานการวัดน้ำหนักอย่างต่อเนื่องด้วยเครื่องซึ่งที่มีความไวสูง (thermo balance) ในระหว่างการวิเคราะห์ อุณหภูมิของตัวอย่างซึ่งอยู่ในบรรยายกาศปกติ หรือก้าชแล็ยจะถูกทำให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลการวิเคราะห์จะถูกบันทึกเป็นเทอร์โมแกรมที่แสดงการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของตัวอย่าง และอุณหภูมิ ดังภาพ 19 การสูญเสียน้ำหนักในช่วงแรกของการวิเคราะห์ หรือที่อุณหภูมิต่ำอาจเกิดจาก การระเหยของน้ำหรือตัวทำละลาย แต่ที่อุณหภูมิสูงมักเกิดจากการสลายตัวของพอลิเมอร์ ข้อมูลเหล่านี้ทำให้ทราบเกี่ยวกับความเสถียรต่ออุณหภูมิของพอลิเมอร์ เทคนิคนี้ยังมีประโยชน์มากในการวิเคราะห์หาสารที่ระเหย หรือสารเติมแต่งที่ใส่ลงไปในพอลิเมอร์อีกด้วย [27]



ภาพ 19 เทอร์โมแกรมที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วย TGA [27]

เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (X-Ray Diffractometer)

เป็นเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุพื้นฐานแบบไม่ทำลาย (non-destructive analysis) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างผลึก การจัดเรียงตัวของอะตอมในโมเลกุลของสารประกอบต่าง ๆ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยอาศัยหลักการเลี้ยวเบนและการกระเจิงของรังสีเอกซ์และความรู้เกี่ยวกับวิชาระบบโครงสร้างผลึก รังสีเอกซ์ เป็นคลื่นแม่เหล็กแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งมีอำนาจการทะลุทะลวงสูง มีความยาวคลื่นสั้นอยู่ในช่วงระหว่าง 0.1 – 100 Å องstrom การเกิดอันตรกิริยาของรังสีเอกซ์กับสารนั้น ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยปรากฏการณ์ดังกล่าวล้วนเป็นลักษณะเฉพาะของสารแต่ละชนิด ซึ่งหลักการดังกล่าวเหล่านี้เราจึงสามารถนำมาใช้วิเคราะห์สารได้ดังนี้ [28]

1. ใช้วิเคราะห์หาองค์ประกอบของชาตุต่าง ๆ ในสารทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
2. ใช้ศึกษาหาโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดพันธะเคมี
3. ใช้ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างผลึก หรือโมเลกุลของสารด้วยการใช้เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์

รังสีเอกซ์ทั้งที่เกิดเองตามธรรมชาติจากการสลายตัวของนิวเคลียสราดูกัมมันตรังสีและที่มนุษย์ผลิตขึ้นจากการอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ เมื่ออะตอมได้รับการกระตุ้นด้วยอิเล็กตรอนที่มีพลังงานสูงวิชนาจะตอมทำให้เกิดอันตรกิริยา ระดับพลังงานของอิเล็กตรอนขึ้นวงโคจรต่าง ๆ ของอะตอมมีค่าสูงขึ้นเกิดภาวะเข้าสู่ปกติ โดยมวลของอะตอมไม่เปลี่ยนแปลงปราภภารณ์ดังกล่าวเป็นกระบวนการการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกิน ในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือไฟฟ้าในลักษณะพัลส์ (Pulse) จากอะตอมทุกครั้งที่ได้รับการกระตุ้น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ปลดปล่อยออกมานี้เรียกว่า “รังสีเอกซ์” ซึ่งแบ่งได้ 2 ชนิด ตามกระบวนการของการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินจากอะตอมบริเวณขึ้นโครงการอิเล็กตรอน คือ

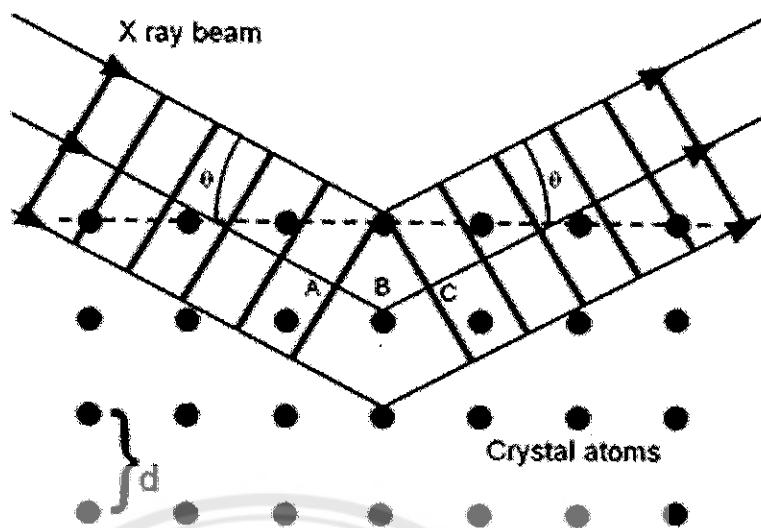
1. รังสีเอกซ์เฉพาะตัว มีลักษณะเป็นรังสีเอกซ์ที่มีพลังงานเดียว (monochromatic X-ray) เพราะเกิดจากการลดระดับพลังงานที่แน่นอน ปราภภารณ์ของการเกิดรังสีเอกซ์นิดนี้เกิดขึ้นเมื่ออิเล็กตรอนหรืออนุภาคที่มีประจุชนิดอื่น ๆ หรือไฟฟ่อนพลังงานสูงเคลื่อนที่เข้าชนอิเล็กตรอนในวงโคจรขึ้นในของอะตอม แล้วถ่ายโอนพลังงานให้อิเล็กตรอน อิเล็กตรอนขึ้นในวงโคจรได้รับพลังงานเพิ่มสูงขึ้นกว่าพลังงานยึดเหนี่ยวของขั้นวงโคจร ทำให้หลุดจากวงโคจรเกิดที่ว่างของอิเล็กตรอนในขั้นวงโคจรขึ้น ทำให้อะตอมอยู่ในภาวะที่ถูกกระตุ้นและลดระดับพลังงานลงสู่ภาวะปกติในช่วงระยะเวลาอันสั้น โดยอิเล็กตรอนของวงโคจรในขั้นดังไปจะลดระดับพลังงานลงมาให้เท่ากับพลังงานยึดเหนี่ยวของวงโคจรขึ้นในด้วยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมานิรปัรังสีเอกซ์ แล้วเข้ามาแทนที่ซึ่งว่างของวงโคจรขึ้นใน พลังงานส่วนเกินนี้จะมีค่าเท่ากับความต่างระดับพลังงานยึดเหนี่ยวเฉพาะวงโคจรของอิเล็กตรอน และชนิดของธาตุนั้น ๆ จึงมีพลังงานเฉพาะค่า

2. รังสีแบบต่อเนื่อง มีลักษณะเป็นรังสีเอกซ์ที่มีพลังงานต่อเนื่องกระจายจากค่าต่ำสุด ถึงสูงสุด ปราภภารณ์ของการเกิดรังสีเอกซ์ต่อเนื่องเกิดจากอิเล็กตรอนพลังงานสูงเคลื่อนเข้าสู่สนามคูลombs (Coulomb field) บริเวณใกล้นิวเคลียส ความหนาแน่นของสนามไฟฟ้าสถิตย์บริเวณดังกล่าวทำให้อิเล็กตรอนสูญเสียพลังงานอย่างรวดเร็วและปล่อยรังสีเอกซ์ออกมานะ

ก่อนที่อิเล็กตรอนปัชมนูนิจะทำอันตรกิริยากับสนามไฟฟ้าบริเวณใกล้นิวเคลียสที่เกิดจากประจุของอะตอม อิเล็กตรอนจะสูญเสียพลังงานบางส่วน อันเนื่องจากการกระเจิงของอิเล็กตรอนดังนั้นพลังงานของรังสีเอกซ์ที่เกิดขึ้น จึงมีค่ากระจายต่อเนื่องจากพลังงานต่ำสุดถึงสูงสุดของอิเล็กตรอนปัชมนูนิ ถ้าอิเล็กตรอนปัชมนูนีมีพลังงานสูงพอที่จะกระตุ้นให้อิเล็กตรอนในวงโคจรขึ้นในของอะตอมหลุดออกจากได้ก็จะเกิดรังสีเอกซ์เฉพาะค่าปัปนช้อนอยู่กับสเปกตรัมของรังสีเอกซ์ต่อเนื่องด้วยเสมอ

การปลดปล่อยรังสีเอกซ์ออกมานี้ค่าความยาวคลื่นได ๆ ขึ้นอยู่กับระดับพลังงานที่คายออกมานะ ซึ่งความยาวคลื่นที่สั้นที่สุดเกิดจากการที่อิเล็กตรอนคายพลังงานที่ได้รับมาหั่งหมดจากแหล่งกำเนิดโดยไม่ขึ้นกับชนิดของเป้าหมายที่ใช้

เมื่อรังสีเอกซ์ตกกระทบผิวน้ำของผลึกโดยทำมุน 0 บางส่วนของรังสีเอกซ์จะเกิดการกระเจิงด้วยชั้นของอะตอมที่ผิวน้ำ ถ้าส่วนหนึ่งของลำรังสีเอกซ์จะผ่านไปยังชั้นที่ 2 ของอะตอม ซึ่งบางส่วนจะกระเจิงและส่วนที่เหลือก็จะผ่านเข้าไปยังชั้นที่ 3 ของอะตอมดังภาพ 20



ภาพ 20 แบบจำลองสำหรับการพิสูจน์กฎของแบรกค์ [28]

ถ้าอ่อนตอมในผลึกมีการจัดเรียงตัวอย่างไม่เป็นระเบียบและมีระยะห่างระหว่างอะตอมเท่าๆ กัน ลำรังสีเอกซ์ที่ผ่านเข้าไปในแต่ละชั้นของอะตอมจะเกิดการเลี้ยวเบนเป็นลักษณะกัน สิ่งสำคัญใน การเกิดการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ขึ้นอยู่กับภาวะ 2 ประการ คือ

1. รังสีที่ตัดกราฟ รังสีเลี้ยวเบน และเส้นตั้งฉากกับผิวน้ำจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกัน
 2. ระยะห่างระหว่างชั้นของอะตอมมีค่าใกล้เคียงกับความยาวคลื่นของรังสีเอกซ์
- เมื่อปี ค.ศ. 1912 แบรกค์ได้ยิงลำรังสีเอกซ์แบบ ๆ กระทบผิวน้ำผลึกเป็นมุม θ เพื่อให้เกิด การเลี้ยวเบนและการกระเจิงเมื่อเกิดอันตรกิริยา กับอะตอม O , P และ R ถ้า

$$SQ + QT = g\lambda \quad (12)$$

เมื่อ g คือ จำนวนเต็ม รังสีที่กระเจิงจะอยู่ในเฟสที่ OCD ผลึกจะทำหน้าที่สะท้อนรังสีเอกซ์ จะเห็นว่า

$$SQ = QT = d \sin\theta \quad (13)$$

เมื่อ d คือ ระยะห่างระหว่างชั้นของผลึก เอียนสนการใหม่ได้ว่า

$$g\lambda = 2d \sin\theta \quad (14)$$

เรียกสมการนี้ว่า สมการของแบรกค์ (Bragg's equation) ซึ่งมีประโยชน์มาก สำหรับ การศึกษาที่มีโครงสร้างเป็นระเบียบ เช่น สารที่มีโครงสร้างเป็นผลึกเดียว (single crystal) และผลึก เชิงซ้อน (polycrystalline) เพราะในสารแต่ละชนิดจะมีรูปแบบการเรียงตัวของอะตอมเป็น ลักษณะเฉพาะ เมื่อเราทราบถึงค่า n ที่เกิดการเลี้ยวเบนไปของรังสีเอกซ์เมื่อชนกับอะตอมของสาร เรา จะทราบถึงระยะห่างระหว่างแต่ละอะตอมของสารนั้น ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการวิเคราะห์ หาชนิดของสาร (qualitative analysis) รวมไปถึงสมบัติทางกายภาพของสารนั้น ๆ อีกด้วย การ คำนวณหาค่าคงที่แลตทิช c , a และค่าอัตราส่วน c/a สามารถกระทำได้โดยอาศัยข้อมูลจาก เครื่องเอกซเรย์ดิฟเฟรอกซ์ และจากสมการที่ (15)

$$\frac{1}{d_{hkl}^2} = \frac{h^2}{a^2} + \frac{k^2}{b^2} + \frac{l^2}{c^2} \quad (15)$$

ในระบบเทหะระโภนลัตน์ ค่าแผลตทิช a มีค่าเท่ากับแผลตทิช b แต่ไม่เท่ากับแผลตทิช c ($a = b \neq c$) ดังนั้น จากสมการที่ (15) เขียนใหม่ได้เป็น

$$\frac{1}{d_{hkl}^2} = \frac{h^2 + k^2}{a^2} + \frac{l^2}{c^2} \quad (16)$$

หรือ

$$\frac{1}{d_{hkl}^2} = (h^2 + k^2) + \frac{l^2}{(c/a)^2} \quad (17)$$

สำหรับเลดไททาเนตสามารถคำนวณหาค่าอัตราส่วน c/a ได้โดยนำค่า d-spacing d_{002} และ d_{200} มาคำนวณตามสมการ (18)

$$c/a = \frac{d_{002}}{d_{200}} \quad (18)$$

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope)

เนื่องจากกล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบทั้งแบบใช้แสงธรรมด้าและใช้รังสีแบบอื่น ๆ มีข้อจำกัดในการขยายภาพ เพราะกำลังขยายและกำลังแยกของเลนส์แล้ว ยังขึ้นอยู่กับความยาวคลื่นของแสงที่ใช้อีกด้วย กล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบสามารถมีกำลังแยกขณะส่องดูวัตถุขนาดเล็กสุดได้เพียง 0.2 ไมโครเมตรเท่านั้น ส่วนกำลังขยายรวมก็ไม่เกิน 2,000 เท่า จึงยังคงเห็นวัตถุภายในเซลล์ที่มีขนาดเล็กเป็นจุด ไม่สามารถแยกรายละเอียดได้ว่าส่วนนั้นเป็นอะไร ทومาได้มีการนำเอาอิเล็กตรอนซึ่งมีช่วงคลื่นสั้นกว่าคลื่นของแสงมาก เข้ามาใช้ในกล้องจุลทรรศน์แทนคลื่นแสง และใช้เลนส์แม่เหล็กแทนเลนส์กระจก เรียกว่ากล้องดังกล่าวว่า กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดเป็นกล้องที่ใช้ศึกษาโครงสร้างหรือองค์ประกอบพื้นผิวของเซลล์เนื้อเยื่อและวัตถุได้โดยทำให้องค์ประกอบต่าง ๆ ของเซลล์หรือวัตถุให้มีความเข้มขึ้น เกาะแตกต่างกัน [29]

หลักการเกิดภาพของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

อิเล็กตรอนปฐมภูมิ (primary electron) จากแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอน (electron gun) จะถูกเร่งด้วยศักย์ไฟฟ้าสูง (1,000 ถึง 3,000 อิเล็กตรอนโวลท์ หรือมากกว่า) ที่สามารถปรับค่าได้จากนั้นจึงถูกดึงดูดลงสู่เบื้องล่างโดยแผ่นอาโนด (anode plate) ภายใต้ภาวะความดันสูญญากาศ $10^{-5} - 10^{-7}$ ทอร์ และมีชุดคอนเดนเซอร์เลนส์ที่จะปรับลำไบอิเล็กตรอน (electron beam) ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อเป็นการเพิ่มความเข้มของลำไบอิเล็กตรอน จากนั้นลำไบอิเล็กตรอนจะวิงลงสู่เบื้องล่างผ่านเลนส์วัตถุ ซึ่งทำหน้าที่ในการปรับลำไบอิเล็กตรอนปฐมภูมิให้มีจุดโฟกัสบนผิwtawoyangพอดี และลำไบอิเล็กตรอนที่ตกกระแทบผิwtawoyang หรือตัวอย่างจะมีขนาดในช่วง 5 ถึง 200 นาโนเมตร โดยมีชุดขอตัวควบคุมการส่องกราด (scan coil) ของลำไบอิเล็กตรอน ทำหน้าที่ในการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของลำไบอิเล็กตรอนบนผิwtawoyang ซึ่งผู้ใช้สามารถกำหนดได้โดยผ่านทางชุดควบคุม (control unit) ขณะที่ลำไบอิเล็กตรอนกระแทบผิwtawoyang จะเกิดอันตรกิริยา (interaction) ระหว่างอิเล็กตรอนปฐมภูมิกับอะตอมธาตุในวัตถุ

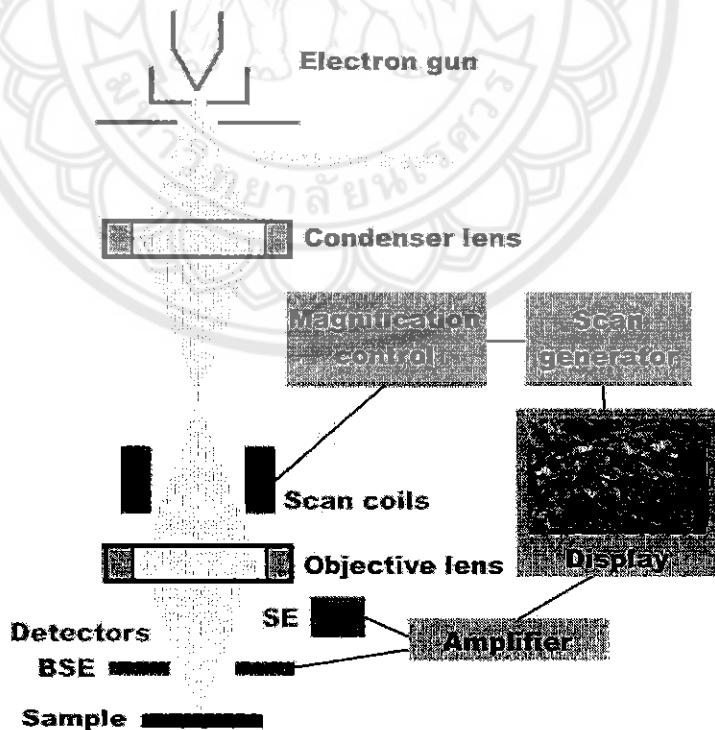


หรือตัวอย่างและเกิดการถ่ายโอนพลังงานที่ชั้นความลึกจากพื้นผิวที่ระดับต่าง ๆ ทำให้เกิดการปลดปล่อยสัญญาณอิเล็กตรอน (electron signal) ชนิด ต่าง ๆ ออกมานี้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาลักษณะผิวของตัวอย่างและวิเคราะห์ธาตุที่มีในตัวอย่างได้ตามลักษณะสัญญาณภาพที่ได้จากสัญญาณอิเล็กตรอนชนิดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น คือ

1. สัญญาณภาพจากอิเล็กตรอนทุติยภูมิ (Secondary Electron Image, SEI) หรือเป็นอิเล็กตรอนพลังงานต่ำ 3-5 อิเล็กตรอนโวลต์ เกิดที่พื้นผิวระดับไมลิก (ไม่เกิน 10 นาโนเมตร) โดยเกิดกับธาตุที่มีแรงยึดเหนี่ยวอิเล็กตรอนที่ผิวต่ำ

2. สัญญาณภาพจากอิเล็กตรอนกระเจิงกลับ (Backscattered Electron Image, BEI) หรือเป็นกลุ่มอิเล็กตรอนที่สูญเสียพลังงานให้กับอะตอมในชั้นงานเพียงบางส่วนและกระเจิงกลับออกมานี้ มีพลังงานสูงกว่าอิเล็กตรอนทุติยภูมิ เกิดที่พื้นผิวระดับลึกกว่า 10 นาโนเมตร โดยเกิดได้กับธาตุที่มีเลขอะตอมสูง

3. สัญญาณภาพจากรังสีเอกซ์ (X-Ray Image, XRI) ชนิดที่เป็นรังสีเอกซ์เฉพาะตัวเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากอิเล็กตรอนในระดับชั้นโคจรต่าง ๆ (K, L, M, \dots) ถูกกระตุ้น (excited) หรือได้รับพลังงานมากพอจนหลุดออกจากวงโคจรของอิเล็กตรอน ทำให้อะตอมต้องรักษาสมดุลของโครงสร้างรวมภายในอะตอม โดยการดึงอิเล็กตรอนจากชั้นวงโคจรตัดไปเข้ามาแทนที่และต้องลดพลังงานส่วนเกินออกมานิรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อทำให้ตัวเองมีพลังงานเท่ากับชั้นโคจรที่ไปแทนที่ ซึ่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้มีความยาวคลื่นเฉพาะในแต่ละธาตุตามระดับพลังงานของตัวอย่างได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ



ภาพ 21 องค์ประกอบและหลักการเกิดภาพของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด [29]

สัญญาณภาพจากอิเล็กตรอนเหล่านี้จะถูกเปลี่ยนมาเป็นสัญญาณภาพปรากวูบจนจอรับภาพได้โดยต้องเลือกใช้อุปกรณ์ในการวัดให้เหมาะสมกับสัญญาณแต่ละชนิด โดยทั่วไปสัญญาณอิเล็กตรอนทุกชนิดใช้ตัวตรวจวัดชนิดพลาสติกเรืองแสง (Plastic scintillation detector) สัญญาณภาพจากอิเล็กตรอนกระแสเจิงกลับจะใช้ตัวตรวจวัดที่เป็นสารกึ่งตัวนำชนิดรอยต่อพีเอ็น (PN junction detector) หรือตัวตรวจวัดชนิดโรบินสัน (Robinson detector) และในสัญญาณภาพจากรังสีเอกซ์จะใช้หัวตรวจรังสีชนิดสารกึ่งตัวนำประเทกซิลิโคนลิตيوم (lithium drifted silicon, Si(Li)) ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ในการวิเคราะห์พัลส์งานของรังสีเอกซ์เฉพาะตัวซึ่งอุปกรณ์วิเคราะห์นั้นมีทั้งแบบช่องเดียว (Single Channel Analyzer, SCA) และอุปกรณ์วิเคราะห์แบบหลายช่อง (Multi Channel Analyzer, MCA)

การหาความหนาแน่น (Density)

ความหนาแน่น หมายถึง ค่ามวลต่อปริมาตรของวัสดุ ณ อุณหภูมิหนึ่งๆ หน่วยของค่าความหนาแน่นสามารถเป็นกรัมต่อมิลลิลิตร ,กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ,ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต , กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็นต้น สำหรับส่วนที่จะได้กล่าวถึงต่อไปนี้จะใช้ในหน่วยของกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่งมีความสำคัญทางด้านเคมีอย่างยิ่งเช่น การอาศัยค่าความหนาแน่นเป็นตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพในการอัดแน่นตัวของวัสดุในระหว่างขั้นตอนการขึ้นรูป ซึ่งสูตรที่ใช้ในการคำนวณนั้นยังสามารถนำไปสู่การหาค่าความพรุนของวัสดุได้อีกด้วย

การหาค่าความหนาแน่นของชิ้นงานนั้นอาศัยหลักการของอาร์คิมีดีสที่กล่าวไว้ว่า “เมื่อจุ่มของแข็งลงในของเหลวจะมีแรงพยุงเกิดขึ้นบนของแข็งนั้น โดยแรงพยุงที่เกิดขึ้นจะมีค่าเท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่ถูกแทนที่ด้วยปริมาตรของแข็ง” วิธีการนี้ทำได้โดยการหาค่ามวลของวัตถุในอากาศและขณะที่จุ่มอยู่ใน [30]

$$\text{ความหนาแน่น } \rho = \frac{W_a}{W_a - W_f} \cdot \rho_f$$

(19)

เมื่อ	ρ	ค่าความหนาแน่นของชิ้นงาน มีหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
	ρ_f	ค่าความหนาแน่นของของเหลว มีหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
	W_a	น้ำหนักแห้งของชิ้นงาน มีหน่วยเป็นกรัม
	W_f	น้ำหนักแห้งของชิ้นงานในของเหลว มีหน่วยเป็นกรัม

ส่วนการหาความหนาแน่นของของเหลวในกรณีที่ทราบปริมาตรที่แน่นอนของของแข็งลงไปสามารถหาได้จาก

$$\rho_f = G/V \quad (20)$$

โดยที่	G	คือ แรงพยุงที่เกิดขึ้นกับของแข็ง (หน่วยเป็นกรัม) หาได้จากน้ำหนักของชิ้นงานในอากาศลบด้วยน้ำหนักของชิ้นงานในของของเหลว
	V	ปริมาตรของของแข็งที่จุ่มลงในของเหลว มีหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตร

สำหรับการหาความหนาแน่นสัมพัทธ์ (relative density): ρ_r] นั้น สามารถคำนวณหาได้ตามสมการที่ (21)

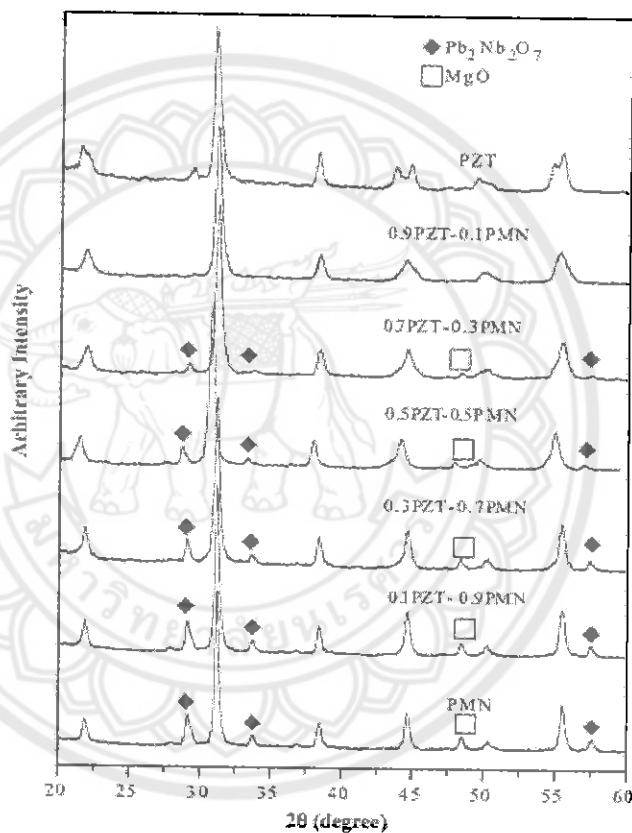
$$\rho_r (\%) = \left(\frac{\rho_b}{\rho_m} \right) \times 100 \quad (21)$$

เมื่อ ρ_r คือ	ค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์
ρ_b คือ	ค่าความหนาแน่นของชิ้นงาน มีหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
ρ_m คือ	ค่าความหนาแน่นทฤษฎีมีหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

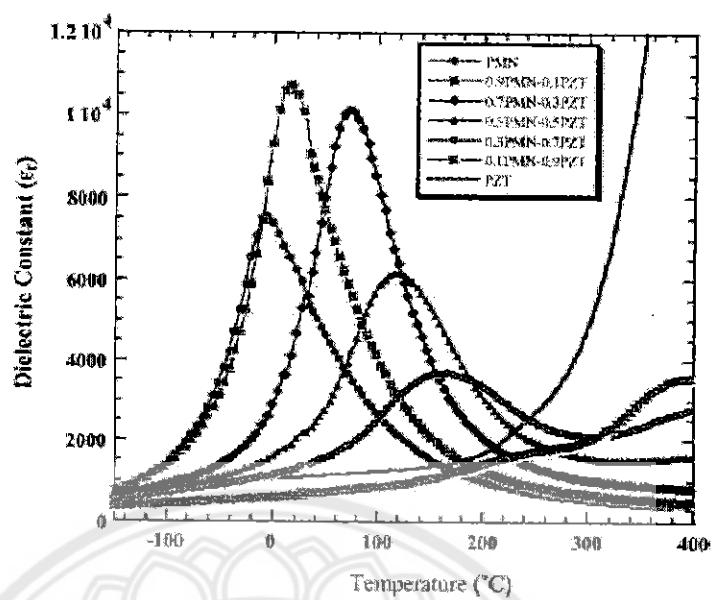
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เซรามิก 0.3PMN-0.7PZT ได้รับความนิยมอย่างมากในการนำมาประยุกต์ใช้ในอุสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากวัสดุเหล่านี้มีสมบัติทางไฟฟ้าที่ดี [1-7] แต่กระบวนการสังเคราะห์เซรามิกเหล่านี้ค่อนข้างยาก เนื่องจากมีการก่อตัวของเฟสแผลกปลอมของ $Pb_2Nb_2O_6$ เกิดขึ้นในระหว่างการ สังเคราะห์เสมอ ส่งผลให้เซรามิกที่เตรียมได้นั้นมีสมบัติทางไฟฟ้าและสมบัติทางกายภาพที่ต่ำลง [5-8] ด้วยเหตุนี้จึงได้มีคนวิจัยต่างๆ ทำการศึกษาค้นคว้ากระบวนการในการสังเคราะห์เซรามิกเหล่านี้ เพื่อ มุ่งหวังที่จะสามารถเตรียมเซรามิกที่มีความบริสุทธิ์และมีสมบัติต่างๆ ที่ดีไว้หลายวิธี เช่น วิธีปฏิกริยา สถานะของแข็ง วิธีโคลัมเบต์ และวิธีทางเคมี จากการเตรียมเซรามิก PMN ด้วยวิธีปฏิกริยาสถานะ ของแข็งนั้น พบร่วมกันของ Pb₂Nb₂O₆ หลงเหลืออยู่ และได้มีผู้ให้คำแนะนำว่าเฟสแผลกปลอมที่เกิดขึ้นนั้น เกิดขึ้นจากสารเคมี MgO ซึ่งทำปฏิกริยา กับสารอื่นค่อนข้างช้าทำให้ต้องใช้อุณหภูมิในการก่อปฏิกริยา ค่อนข้างสูง ด้วยเหตุนี้ทำให้ Swartz และ Shrout [31] ได้นำกระบวนการเตรียมเซรามิก PMN ด้วย วิธีปฏิกริยาสถานะของแข็งมาทำการพัฒนา โดยมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการแคลไชน์ออกเป็นสอง ส่วน คือ การเตรียม MgNb₂O₆ (MN) แคลไชน์ที่อุณหภูมิ > 1000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2-6 ชั่วโมง และนำผงผลึก MN ที่ได้ผสมกับ PbO และแคลไชน์ที่อุณหภูมิ > 900 องศาเซลเซียส พบร่วมกับ ผลึก PMN ที่เตรียมด้วยวิธีนี้ยังไม่บริสุทธิ์ โดยมีความบริสุทธิ์ ~90% แล้วกระบวนการเตรียมใช้ อุณหภูมิในการเตรียมที่สูง ส่งผลให้สารตั้งต้นอาจมีการระเหยออกไประหว่างกระบวนการเผาแคลไชน์ ทำให้อัตราส่วนของสารตั้งต้นมีความผิดเพี้ยนทำให้เซรามิกที่เตรียมได้นั้นมีสมบัติต่างๆ ที่ไม่ดีเท่าที่ควร ต่อมา K. R. HAN และ S. Kim [32] ได้พยายามที่พัฒนากระบวนการเตรียมผงผลึก PMN ที่บริสุทธิ์ โดยการเตรียมด้วยวิธีการผสมออกไซด์ โดยมีการพบว่า Mg(NO₃)₂ สามารถละลายในน้ำและแยกออก ออกได้ดีกว่า MgO และ MgCO₃ จึงมีการใช้ Mg(NO₃)₂ แทน MgO พบร่วมกับผงผลึก PMN ที่มีความ บริสุทธิ์มากกว่า 99% โดยใช้การแคลไชน์เพียงขั้นตอนเดียว ผงผลึก PMN ที่มีโครงสร้างเพอร์อฟสไกท์ แบบเฟสเดียว โดยใช้เงื่อนไขการเตรียมโดยการเผาแคลไชน์ที่อุณหภูมิ 950°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากกระบวนการเตรียมเซรามิกที่มีหลายวิธีจึงมีผู้วิจัยหลายกลุ่มนำวิธีการเตรียมดังที่ได้กล่าวมาต้นมา ประยุกต์ในการเตรียมเซรามิก PMN-based ซึ่งผลการทดลองจะรายงานโดยสังเขป เช่น งานวิจัยของ R. Yimnirun และคณะ [33] เตรียมเซรามิก $(x)Pb(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O_3-(1-x)Pb(Zr_{0.52}Ti_{0.48})O_3$ โดยที่ $x = 0, 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9$ และ 1.0 ด้วยวิธีผสมออกไซด์ (Mixed-oxide method) โดยการเตรียม ผงผลึก $Pb(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O_3$ ประกอบด้วยขั้นตอนการสังเคราะห์ผงผลึก MgNb₂O₆ (MN) โดยใช้

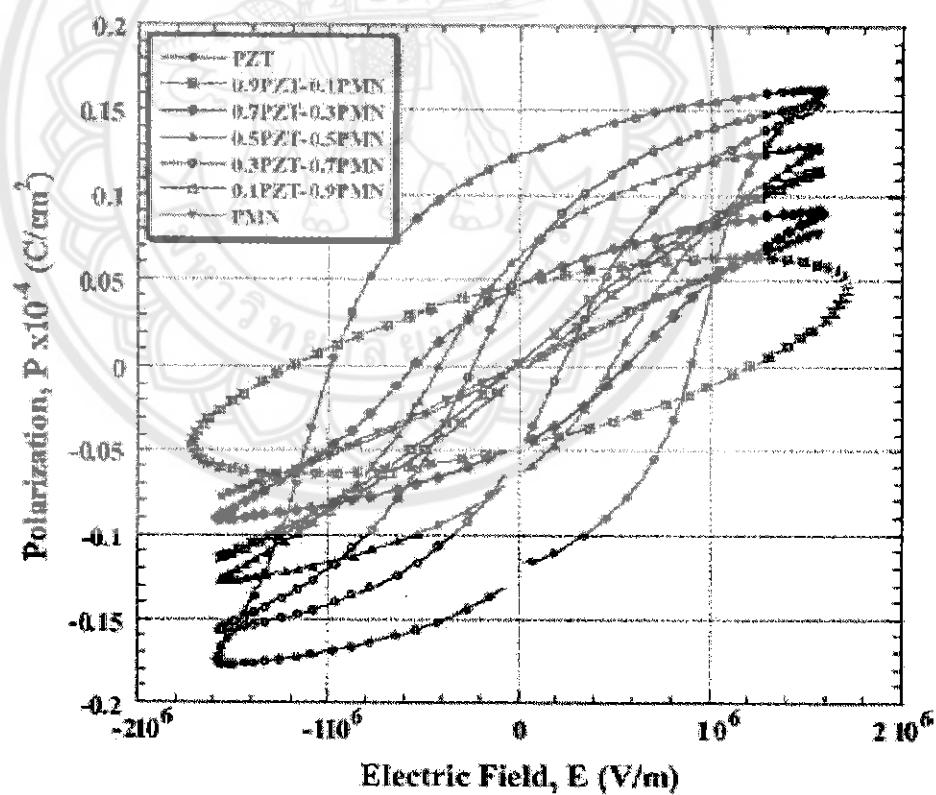
อุณหภูมิในการเผาแคลไชน์ 1050 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2.5 ชั่วโมง จากนั้นนำผงพลีก MN ผสมกับสาร PbO และทำการแคลไชน์ที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2.5 ชั่วโมง จากนั้นทำการเตรียมผงพลีก $Pb(Zr_{0.52}Ti_{0.48})O_3$ โดยนำสารตั้งต้น PbO, ZrO₂ และ TiO₂ นำมาผสมกันตามอัตราส่วน และทำการเผาแคลไชน์อุณหภูมิ 850 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง เมื่อได้ผงพลีกของ PMN และ PZT แล้วนำผงพลีกทั้งสองมาผสมตามอัตราส่วนดังที่กล่าวมาข้างต้น ขึ้นรูปและเผาเซินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1000-1300 องศาเซลเซียส ซึ่งวัสดุเซรามิกที่เตรียมได้นั้นมีเฟสเปลกปลอกของ $Pb_2Nb_2O_7$ เหลืออยู่ดังแสดงในภาพ 22 และเซรามิกมีค่าคงที่ไดอิเล็กทริกและค่าสภาพขั้วต่อกันที่ค่อนข้างต่ำดังแสดง 23 และ 24



ภาพ 22 แสดงรูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของผงพลีก (1-x)PMN-xPZT [33]

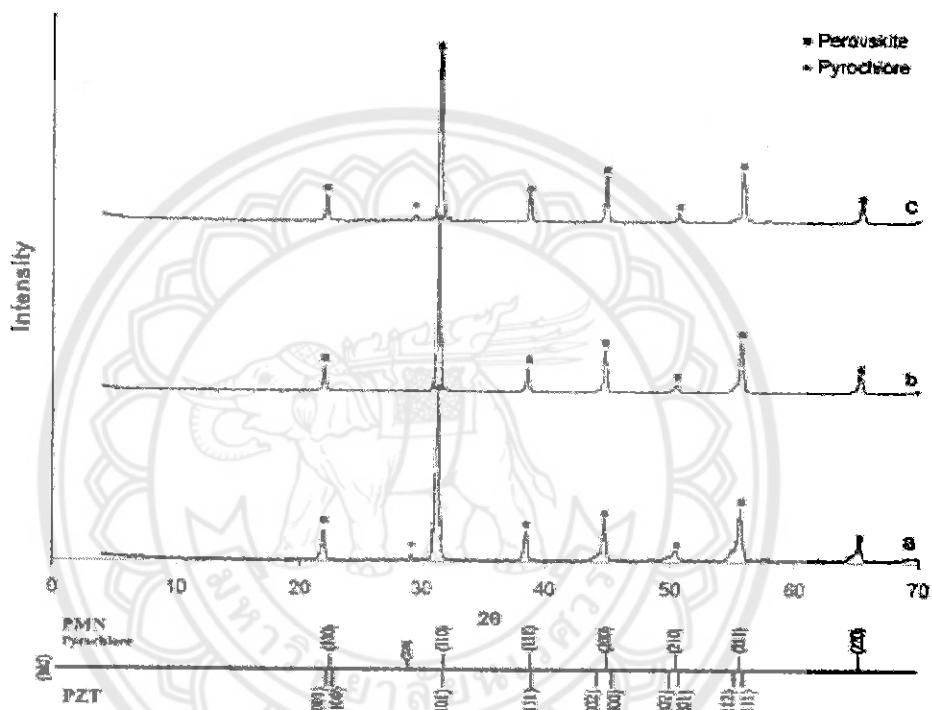


ภาพ 23 แสดงค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของเซรามิก $(1-x)$ PMN- x PZT ที่อุณหภูมิต่างๆ [33]

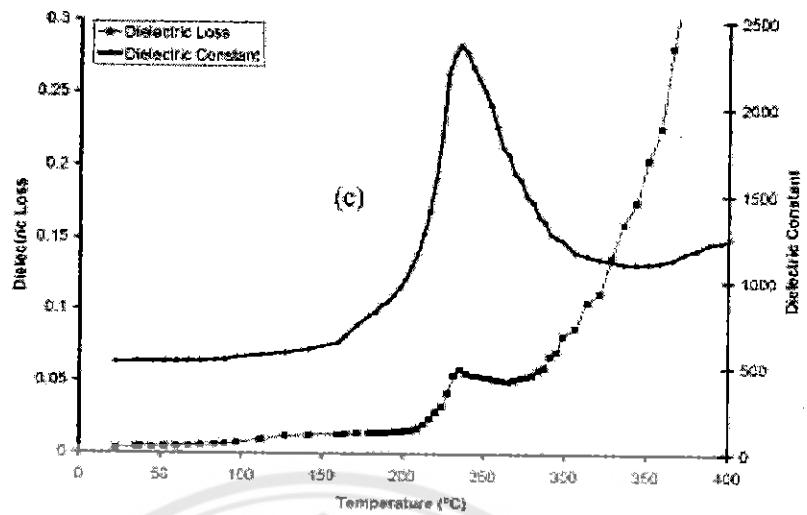


ภาพ 24 วงรอบอีสเทอเรซิสสะหว่างค่าโพลาไรเซชันกับสนามไฟฟ้าของเซรามิก $(1-x)$ PMN- x PZT [47]

P. Moetakef, et al. [7] เตรียมเซรามิก PMN-PZT ด้วยวิธีเจล (sol gel method) โดยขั้นตอนเตรียมประกอบด้วยสองส่วนหลัก คือ การเตรียมผงพลีก PZT ด้วยวิธีเจลโดยเผาแคลไชน์ที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส จากนั้นผงพลีก PZT ที่ได้ผสมกับสารตั้งต้น PMN ที่ทำการบดผสมไว้ นำสารทั้งสองชนิดผสมกันตามอัตราส่วนแล้วทำการอัดขึ้นรูป และทำการเผาชินเตอร์ โดยการซินเตอร์จะแบ่งเป็นสองขั้นตอน ใช้อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นให้ความร้อนต่อ จนถึงอุณหภูมิ 1200 เป็นเวลา 2 ชั่วโมง พบร้าเซรามิกที่ได้ยังมีเฟสแบลกปลอมเหลืออยู่ดังแสดงในภาพ 25 และมีค่าความหนาแน่นและค่าคงที่ไดอิเล็กทริกค่อนข้างต่ำ 83 % และ 2000 ดังแสดงในภาพ 26



ภาพ 25 รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของผงพลีก (1-x) PMN-xPZT ชินเตอร์ที่ อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส โดยที่ (a) $x = 0.3$ (b) $x = 0.5$ และ (c) $x= 0.7$ [7]



ภาพ 26 ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของเซรามิก 0.3PMN-0.7PZT ซึ่นเตอร์ที่อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง [7]

บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย

สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง

1. เลดอกอไชร์ด (PbO) ความบริสุทธิ์ 99%
1. แมกนีเซียมไนเตรต ($Mg(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$) ความบริสุทธิ์ 99%
2. ไนโอลูบิมออกอไชร์ด (Nb_2O_5) ความบริสุทธิ์ 99%
3. ไททาเนียมไดออกอไชร์ด (TiO_2) ความบริสุทธิ์ 99%
4. เชอร์โคเนียมไดออกอไชร์ด (ZrO_2) ความบริสุทธิ์ 99%
5. ไกลซีน ($C_2H_5NO_2$)
6. สารละลายเอทานอล (Ethanol solution) ความบริสุทธิ์ 99.7%

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมสาร

1. เครื่องซั่งแบบละเอียด satorius AG GOTTINGEN type Fabr-Nr (ควบคุมการทำงานด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์) ใช้ซั่งมวลได้มากที่สุดไม่เกิน 310 กรัม โดยมีความละเอียด 0.001 กรัม
2. ตู้อบสารของยีห้อ Memmert D06057 Model 100 อุณหภูมิในการอบสูงสุด 200 องศาเซลเซียส
3. กระปองพลาสติกที่ใช้ในการผสมสารทำด้วยโพลีเมอร์และมีฝาปิดสนิท โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร ความสูง 10.7 เซนติเมตร
4. เม็ดบดโดยทั่งกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 7 มิลลิเมตร (ใช้ในจำนวน 250 เม็ด)
5. เครื่องผสมแบบบดโดยรอบแบบลูกบولد (Ball milling)
6. Hot plate สำหรับใช้ในการทำให้สารละลายแยก
7. Magnetic stirrer สำหรับคนสารให้เข้ากัน
8. ข้อมตักสาร
9. บีกเกอร์ขนาด 1000 ซีซี
10. แม่พิมพ์ (Punch and die) ใช้ในการขันรูปเซรามิก
11. กระดาษฟอยล์ (Foil)
12. เครื่องอัดไฮโดรลิกสำหรับขันรูปเซรามิก อัดแรงดันได้สูงสุด 1000 Kg/cm³
13. เตาเผาสาร Eurotherm อุณหภูมิสูงสุดในการเผา 1700 องศาเซลเซียส
14. เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (X-ray diffractometer)
15. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่งกราด (SEM)
16. เครื่องวัดค่าคงที่ดิจิทัลทริก (Aligent LCR Meter)
17. เครื่องวัดวงอิสเทอเรซีส

วิธีการทดลอง

ขั้นตอนการเตรียมผงผลึกและเซรามิก 0.3PMN-0.7PZT แสดงดังภาพ 27 และ 28, 29 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตอนที่ 1 การเตรียมผงผลึก 0.3PMN-0.7PZT

1. ชั้นสารตั้งต้นคือ เลอดอกไชร์ แมgnีเซียมไนเตրต์ ในโอลิเบียมออกไซด์ เชอร์โคเนียมไดออกไซด์ และไททาเนียมไดออกไซด์ ซึ่งตามอัตราส่วนโดยมวลที่ได้จากการคำนวณ

2. นำสารที่ผ่านการซึ่งจากข้อ 1 มาทำการผสมตามชนิดของผงผลึกที่ต้องการในกระป่องพลาสติกที่มีเม็ดบลอนขนาด 7 มิลลิเมตร จำนวน 250 เม็ด โดยเติมอุ่นอลในปริมาณ 200 มิลลิลิตร ซึ่งจะช่วยในการผสมสารให้สมกันดียิ่งขึ้น โดยจะมีการป้องผสมสารจำนวน 4 ชุดคือ สารผสมของ 0.3PMN-0.7PZT จากนั้นนำไปบดเป็นเวลา 24 ชั่วโมง

3. เมื่อครบ 24 ชั่วโมงแล้ว จากนั้นนำสารที่อยู่ในกระป่องบลอลแต่ละกระป่องทำการเทลงในตะแกรง漉漉ที่วางอยู่บนบีกเกอร์เพื่อแยกของที่ผสมออกจากเม็ดบลอล โดยการแยกนี้จะทำเป็นชุดตามชนิดของสาร แล้วจึงนำสารแต่ละชุดทำการแยกเอาอุ่นอลออกจากโดยใช้ Hot plate

4. เมื่อทำการแยกเอาอุ่นอลออกจากสารแล้วจึงทำการอบในเตาอบโดยใช้อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 6 ชั่วโมง

5. นำสารของ 0.3PMN-0.7PZT ที่ผ่านการอบแห้งแล้วมาทำการบดโดยใช้ครกหยก (Agate) เพื่อคัดขนาดและเพื่อให้ได้ผงผลึกที่มีขนาดที่สม่ำเสมอ

6. นำผงผลึกที่ผ่านการบดคัดขนาดในแต่ละชนิดมาบดผสมกับซีน โดยใช้อัตราส่วน

7. สารตั้งต้น: เชือเพลิง นำผงส่วนหนึ่งไปตรวจสอบด้วยเครื่อง DTA-TG

8. นำสารที่บดผสมกับซีนแต่ละชนิดนำมาใส่ใน Crucible เปิดฝาจากนั้นนำไปเผาแคลไชน์ในเตาโดยใช้อุณหภูมิ 700-1000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง อัตราการขึ้นลงของอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียสต่อนาที

9. นำผงผลึก 0.3PMN-0.7PZT ที่ผ่านการแคลไชน์ ไปตรวจสอบโครงสร้างผลึกและโครงสร้างจุลภาค ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

ตอนที่ 2 การเตรียมเซรามิก PMN-PZT

1. ทำการเตรียมเซรามิก 0.3PMN-0.7PZT โดยการนำผงผลึก 0.3PMN-0.7PZT ที่ได้จากการเผาแคลไชน์จากตอนที่ 1 มาใส่กระป่องพลาสติกที่มีเม็ดบลอนขนาด 7 มิลลิเมตร โดยเติมอุ่นอลในปริมาณ 200 มิลลิลิตร และผสม PVA ลงไปเป็นปริมาณร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก จากนั้นทำการปิดฝาให้สนิทแล้วนำไปบดโดยยับบลอลเป็นเวลา 24 ชั่วโมง

2. เมื่อครบ 24 ชั่วโมงแล้ว จากนั้นนำสารที่อยู่ในกระป่องบลอลแต่ละกระป่อง ทำการเทลงในตะแกรง漉漉ที่วางอยู่บนบีกเกอร์เพื่อแยกของที่ผสมออกจากเม็ดบลอล โดยการแยกนี้จะทำเป็นชุดตามชนิดของสาร แล้วจึงนำสารแต่ละชุดทำการแยกเอาอุ่นอลออกจากโดยใช้ Hot plate และนำไปอบที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง

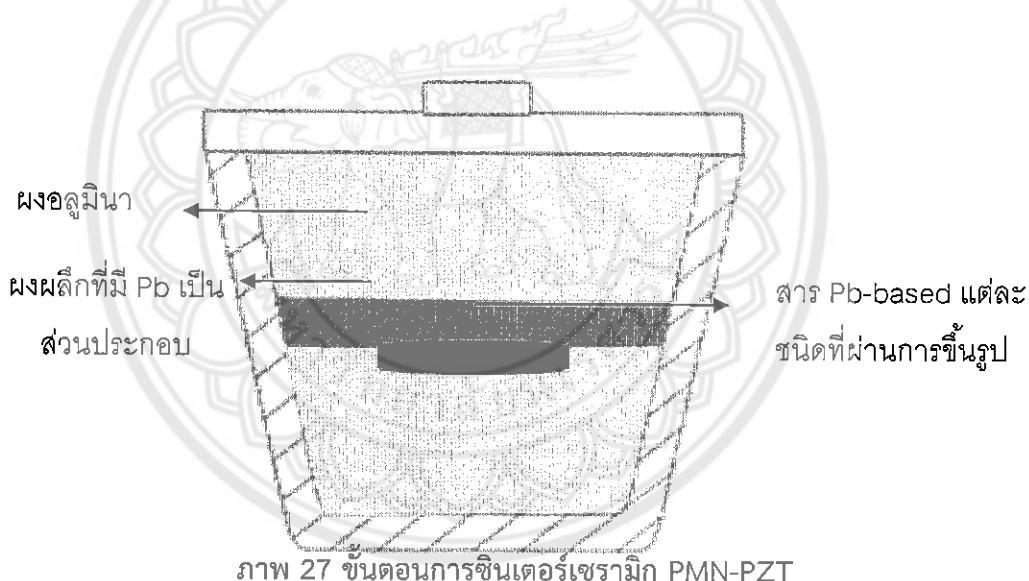
3. นำสารที่อบเสร็จในแต่ละชนิดมาบดย่อยอย่างหยาบโดยใช้ครกหยอก (Agate) เพื่อคัดขนาดเพื่อให้ได้ผงผลึกที่มีขนาดที่สม่ำเสมอ

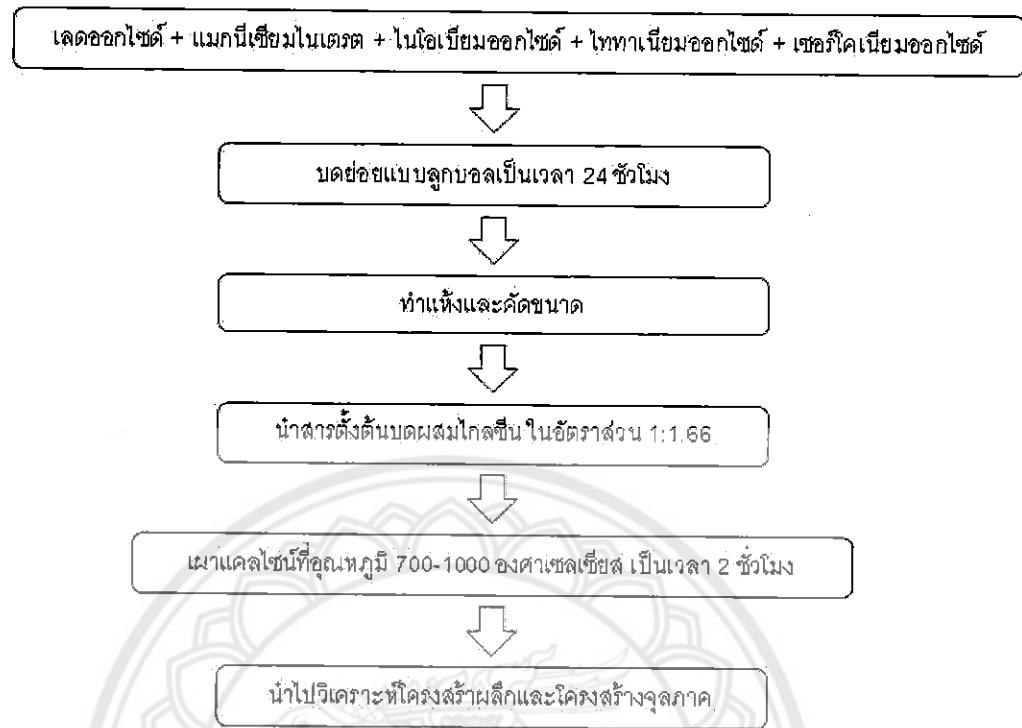
4. จากนั้นนำผง 0.3PMN-0.7PZT ที่ผสม PVA และผ่านการบดย่อยเพื่อคัดขนาด มาทำการอัดขึ้นรูปให้เป็นรูปทรงกระบอกโดยใช้แม่พิมพ์โลหะที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5 เซนติเมตร โดยใช้ผงผลึก PMN-PZT ในปริมาณ 1.5 กรัม ในการอัดขึ้นรูป 1 ครั้งต่อหนึ่งชนิดของสาร โดยใช้ค่าความดันในการอัดขึ้นรูป 80 MPa

5. นำชิ้นงานแต่ละชนิดที่ผ่านการขึ้นรูปมาเรียงไว้ในถ้วยอะลูминิ婩ที่มีฝาปิด โดยทำการจัดเรียงเป็นชั้นๆ ในแต่ละชั้นจะมีการนำสารตั้งต้นที่มีตะกั่วเป็นส่วนประกอบ กับบันเม็ดเซรามิกเพื่อสร้างบรรยากาศของตะกั่วล้อมรอบเม็ดเพื่อลดการระเหยของตะกั่ว จากนั้นจะนำผงอะลูминิกับทับอีกครั้ง ดังแสดงในภาพ 16

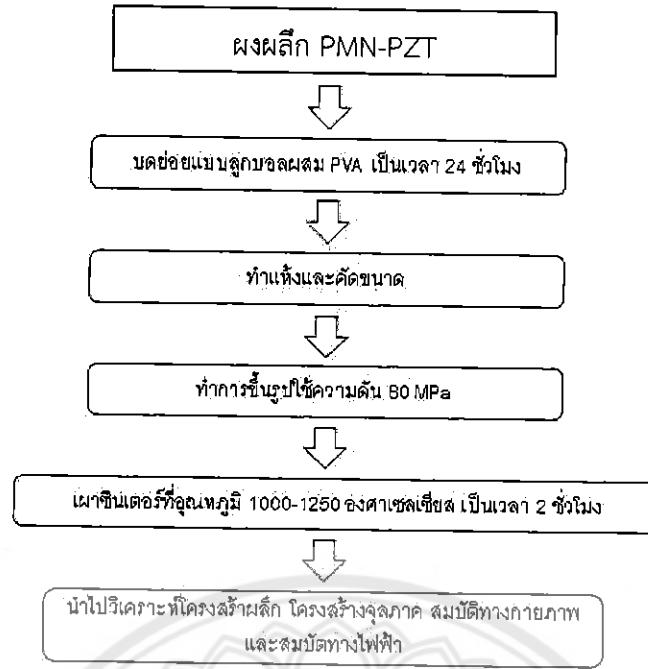
6. ทำการเผาชินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1000-1250 องศาเซลเซียสโดยอัตราการขึ้นลงของอุณหภูมิ เป็น 5 องศาเซลเซียสต่อนาที

7. นำเซรามิก 0.3PMN-0.7PZT ที่ผ่านการเผาชินเตอร์ไปทำการศึกษาสมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางไฟฟ้า





ภาพ 28 แผนผังขั้นตอนการเตรียมผงผลึก 0.3PMN-0.7PZT



ภาพ 29 แผนผังขั้นตอนการเตรียมเซรามิก 0.3PMN-0.7PZT

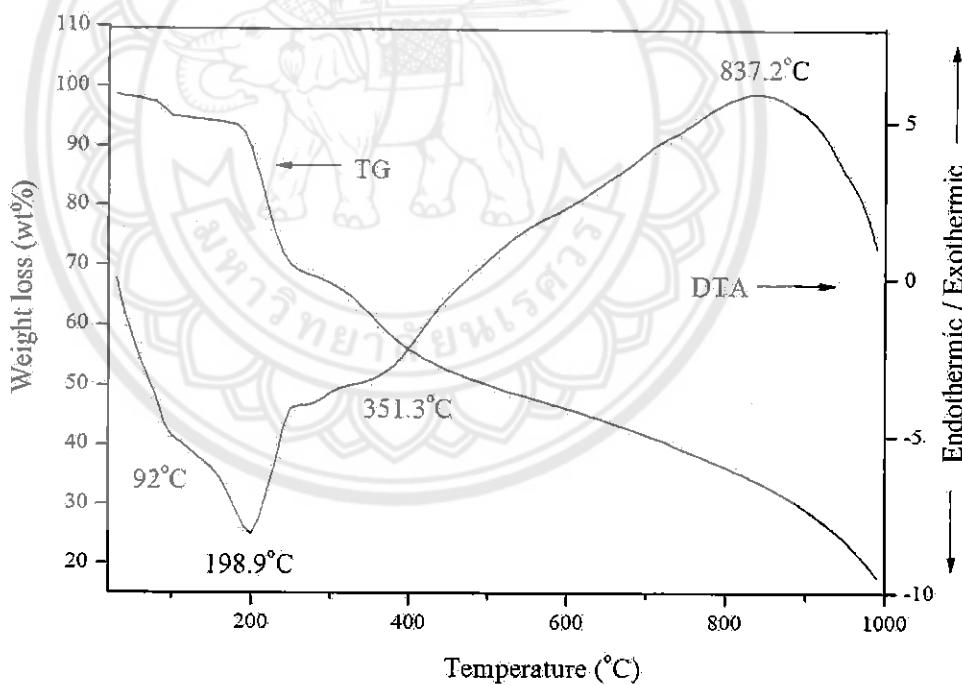


บทที่ 4

ผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง

บทนี้จะเป็นการนำเสนอในส่วนของผลการทดลองการเตรียมผงผลึกและเซรามิกในระบบ PMN-PZT ผลการตรวจสอบโครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาค ของผงผลึกเหล่านี้ ภายใต้เงื่อนไขการเผาแคลไชน์ต่างๆ และแสดงผลการตรวจสอบพฤติกรรมของโครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางกายภาพของเซรามิกเหล่านี้ ได้แก่ ความหนาแน่น การหดตัวเชิงปริมาตร หลังการเผาชิ้นเตอร์ และวิเคราะห์สมบัติทางไฟฟ้าซึ่งได้แก่ ค่าสภาพย้อมส้มพัทช์ ค่าตัวประจุกับการสูญเสียโดยอิเล็กทริก ค่าสัมประสิทธิ์พิโซอิเล็กทริก และค่าสมบัติเฟอร์โรอิเล็กทริกของเซรามิกที่เตรียมได้ พร้อมอภิปรายผลการทดลองตามลำดับ ดังต่อไปนี้

1. การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทางความร้อนของสารผสม PMN-PZT ด้วยเทคนิค DTA และ TG



ภาพ 30 กราฟ DTA และ TG ของสารผสม PMN-PZT ที่ใช้อัตราการขึ้นลงของอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส/นาที

การศึกษาในขั้นตอนนี้ เป็นการวิเคราะห์เชิงความร้อนของสาร เพื่อเลือกช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเผาแคลไชน์ของผงตัวอย่าง PMN-PZT ซึ่งแสดงในภาพ 30 จากผลการตรวจสอบสาร

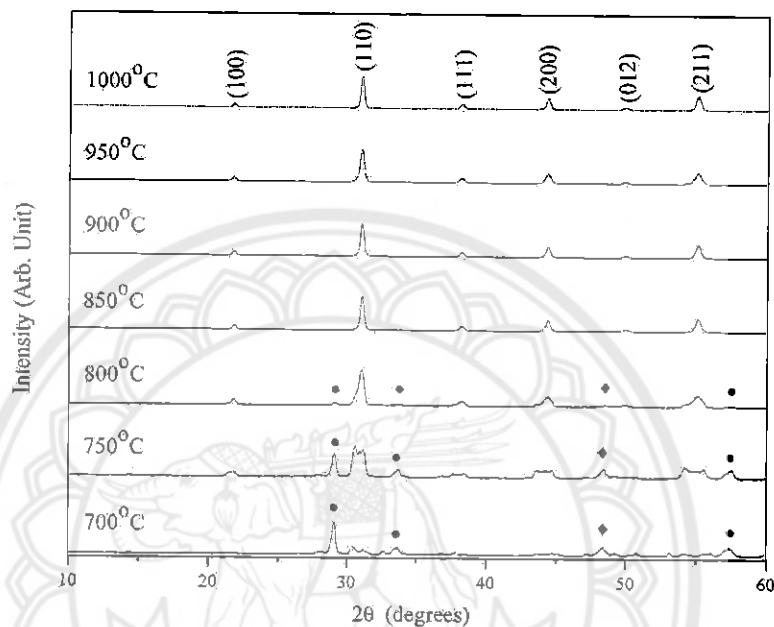
ผสมของ PMN-PZT ที่ประกอบด้วยสารตั้งต้น PbO , $Mg(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$, Nb_2O_5 , TiO_2 และ ZrO_2 ผสมกับไกลซีน ($C_2H_5NO_2$) ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ในอัตราส่วนของสารตั้งต้นต่อเชื้อเพลิง 1:1.66 จากการพิจารณากราฟ TG ซึ่งแสดงร้อยละการสูญเสียน้ำหนักของสาร พบร่วมกันของการเปลี่ยนแปลงความชื้นเป็น 4 ช่วง โดยช่วงแรกเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ช่วงอุณหภูมิ 30-100 องศาเซลเซียส ซึ่งเกิดการสูญเสียน้ำหนักเนื่องจากการระเหยของน้ำเนื่องจากความชื้นในสารผสม ซึ่งสอดคล้องกับปฏิกริยาการดูดความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 92 องศาเซลเซียส ของกราฟ DTA การเปลี่ยนแปลงความชื้นในช่วงที่สองและช่วงที่สามของกราฟ TG เกิดขึ้นที่ช่วงอุณหภูมิ 100-220 องศาเซลเซียส และที่อุณหภูมิมากกว่า 220 แต่น้อยกว่า 400 องศาเซลเซียส เกิดการสูญเสียน้ำหนักเนื่องจากการหลอมเหลวของไกลซีนและการระเหยของน้ำและก๊าซที่เกิดจากการสลายตัวของไกลซีน แสดงในสมการที่ 4.3 ซึ่งสอดคล้องกับปฏิกริยาดูดความร้อน (endothermic) ของกราฟ DTA ที่อุณหภูมิประมาณ 198.9 และ 351.3 องศาเซลเซียส และการเปลี่ยนแปลงความชื้นของกราฟ TG ในช่วงสุดท้ายที่ช่วงอุณหภูมิมากกว่า 400 องศาเซลเซียส ซึ่งแสดงการสูญเสียน้ำหนักอย่างต่อเนื่อง พบร่วมกับกระบวนการการคลายความร้อน (exothermic) ของกราฟ DTA ที่อุณหภูมิ ประมาณ 837.2 องศาเซลเซียส ซึ่งอาจเกิดจากการเปลี่ยนเฟส หรือ การเกิดปฏิกริยาเคมีของสารผสม ดังนั้น เพื่อตรวจสอบสาเหตุดังกล่าวนี้จึงนำสารผสมไปเผาแคลไไซน์ในช่วงอุณหภูมิ 700-1000 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นทำการตรวจสอบการก่อเกิดเฟสที่ปรากฏด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์



2. การตรวจวิเคราะห์โครงสร้างผลึก PMN-PZT

การเตรียมผงผลึก PMN-PZT ด้วยวิธีการเผาไหม้ (combustion method) โดยใช้ไกลซีนเป็นเชื้อเพลิงในอัตราส่วนของสารตั้งต้นต่อเชื้อเพลิง 1:1.66 และใช้อุณหภูมิแคลไไซน์ตั้งแต่ 700-1000 องศาเซลเซียส หลังจากการเตรียมผงผลึก PMN-PZT จากนั้นทำการตรวจสอบผลการทดลอง โดยการตรวจวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (X-ray Diffractometer; XRD) ได้ผลดังแสดงดังภาพ 31 ซึ่งจะเห็นได้ว่าผงผลึก PMN-PZT แสดงโครงสร้างผลึกเป็นแบบบูร์โดคิวบิก (pseudo-cubic) [7, 33, 34] จากการพิจารณาพื้นที่ของรังสีเอกซ์ของผงผลึก PMN-PZT ที่อุณหภูมิแคลไไซน์ต่ำกว่า 850 องศาเซลเซียส พบร่วมกับการมีพื้นที่เปลกปลอกลดลงเกิดขึ้นที่ตำแหน่ง 2θ ประมาณ 29 33 และ 57 องศา ซึ่งพื้นที่เปลกปลอกมีสอดคล้องกับพื้นที่ของผลึกไฟโรคลอเร (pyrochlore) ซึ่งสูตรทางเคมีเป็น $Pb_2Nb_2O_7$ โดยสอดคล้องกับเพิ่มข้อมูลมาตรฐานหมายเลขอุณหภูมิแคลไไซน์ 30-711 ที่โครงสร้างเป็นแบบโมโนคลินิก (monoclinic) และที่มุม 2θ ประมาณ 48 องศา แสดงพื้นที่เปลกปลอกมีสอดคล้องกับพื้นที่ของผลึก MgO ที่สอดคล้องกับเพิ่มข้อมูลมาตรฐานหมายเลขอุณหภูมิแคลไไซน์ 01-1235 ที่แสดงโครงสร้างแบบคิวบิก (cubic) ซึ่งจากข้อมูลของการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของผงผลึก PMN-PZT สามารถคำนวณหาค่าร้อยละความบริสุทธิ์ของผงผลึก PMN-PZT ที่เผาแคลไไซน์ที่อุณหภูมิต่างๆ ผลการคำนวณพบว่า เมื่ออุณหภูมิในการเผาแคลไไซน์เพิ่มขึ้นผงผลึก PMN-PZT มีค่าความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณของเฟสเปลกปลอกของ $Pb_2Nb_2O_7$ และ MgO มีปริมาณลดลงดังแสดงในตารางที่ 1 ดังนั้นเมื่อไข่ที่เหมาะสมที่สุดในการเตรียมผงผลึก PMN-PZT จะประกอบด้วย

อุณหภูมิในการเผาแคลไนซ์ที่ 850 องศาเซลเซียส เป็นเวลาเผา灼 2 ชั่วโมง อัตราการขึ้นลงของอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียสต่อนาที เนื่องจากผงผลึก PMN-PZT ที่เตรียมด้วยเงื่อนไขดังกล่าวแสดงค่าร้อยละความบริสุทธิ์สูงที่สุดเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ จากการวิเคราะห์ผลโครงสร้างผลึกโดยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ พบร่วมกันในกระบวนการเผาแคลไนซ์ PMN-PZT ที่บริสุทธิ์สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ด้วย DTA-TG

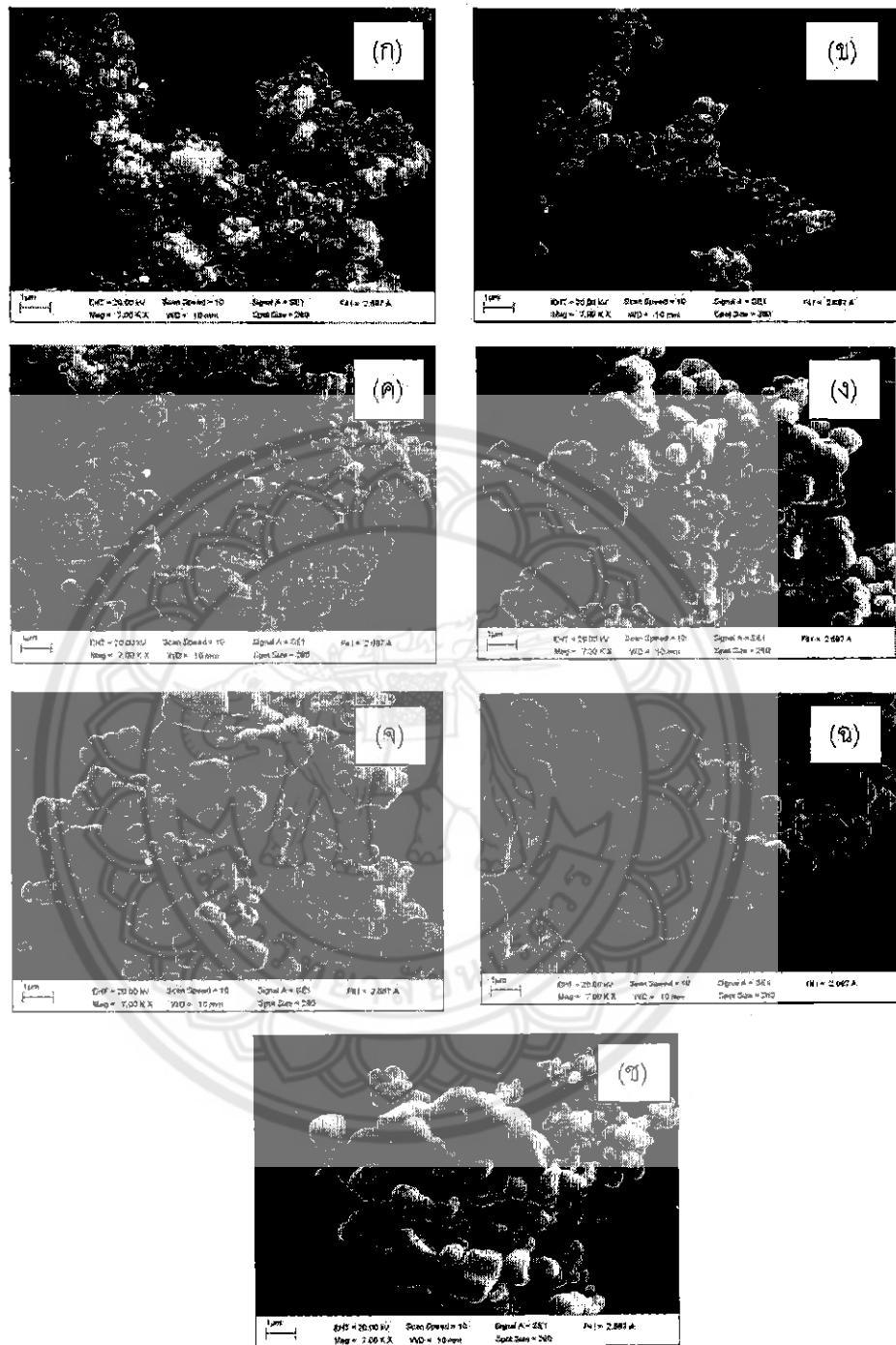


ภาพ 31 รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของผงผลึก PMN-PZT ที่เผาแคลไนซ์ที่อุณหภูมิ 700-1000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง อัตราการขึ้นลงของอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียสต่อนาที

ตาราง 1 ค่าร้อยละความบริสุทธิ์ของผงผลึก PMN-PZT เผาแคลไนซ์ที่อุณหภูมิระหว่าง 700-1000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

อุณหภูมิแคลไนซ์ (°C)	ร้อยละความบริสุทธิ์ (%)
700	38.2
750	55.6
800	97.3
850	100.0
900	100.0
950	100.0
1000	100.0

2. การตรวจวิเคราะห์โครงสร้างของผลึก PMN-PZT



ภาพ 32 ภาพถ่ายบีริเวนผิวน้ำของผลึก PMN-PZT ที่เผาแคลไนท์ที่อุณหภูมิ (ก) 700 (ข) 750 (ค) 850 (ง) 900 (จ) 950 และ (ฉ) 1000 องศาเซลเซียส เวลา 2 ชั่วโมง อัตราการขึ้นลงของอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียสต่อนาที

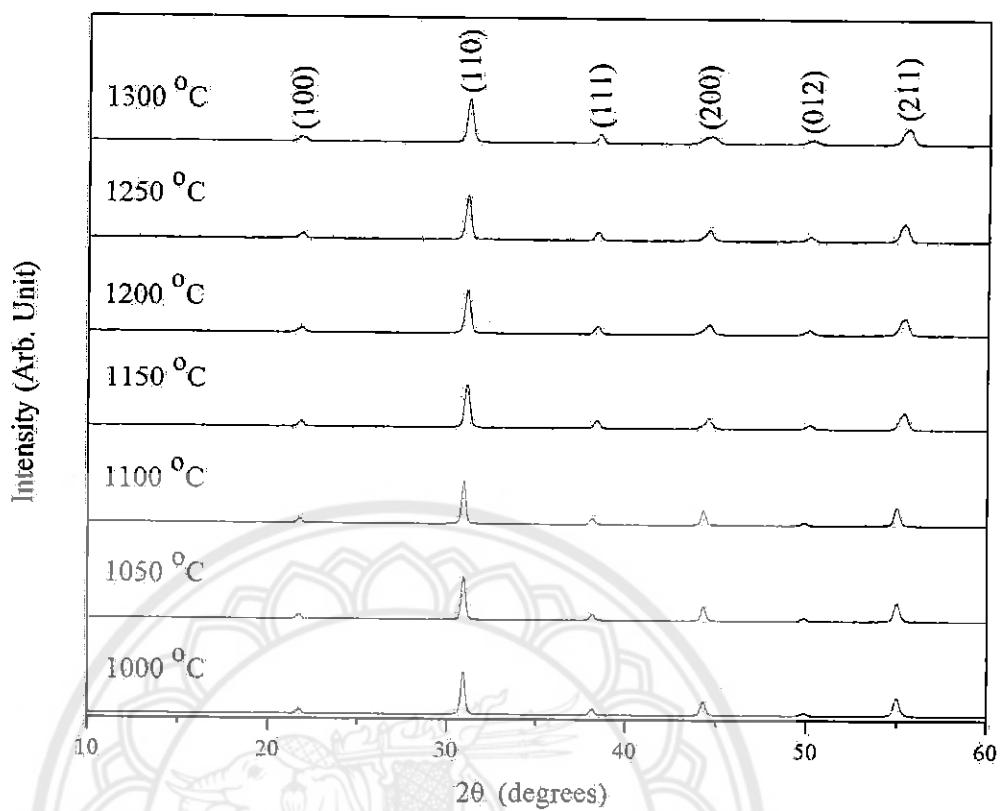
หลังจากการเตรียมผงผลึก PMN-PZT ด้วยวิธีการเผาไหม้ (combustion method) ซึ่งใช้ไกลซินเป็นเชื้อเพลิงในอัตราส่วนของสารตั้งต้นต่อเชื้อเพลิง 1:1.66 และใช้อุณหภูมิแคลร์ไซน์ตั้งแต่ 700-1000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง อัตราขึ้นลงของอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียสต่อนาที จากนั้นทำการตรวจนิวเคลอเรชั่นโครงสร้างจุลภาคของผงผลึก PMN-PZT ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope: SEM) ผลการวิเคราะห์แสดงดังภาพ 32 พบร่วมกับผงผลึก PMN-PZT มีลักษณะเป็นสองรูปทรงผสมกัน โดยมีผงผลึกที่มีลักษณะค่อนข้างกลม โดยอนุภาคของผงผลึกมีการรวมตัวเกาะกันเป็นกลุ่มก้อนอย่างหนาแน่นและจากภาพจะเห็นได้ว่าขนาดของผงผลึก PMN-PZT มีขนาดไม่ค่อยสม่ำเสมอโดยมีขนาดเล็กและใหญ่เกาะกลุ่มรวมกัน จากการหาขนาดอนุภาคเฉลี่ยมีค่าประมาณ 0.20-1.23 ไมโครเมตร โดยที่ขนาดเฉลี่ยของผงผลึก PMN-PZT มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิในการเผาแคลร์ไซน์เพิ่มขึ้นดังแสดงในตาราง 2

ตาราง 2 ขนาดอนุภาคเฉลี่ยของผงผลึก PMN-PZT ที่เผาแคลร์ไซน์ที่อุณหภูมิ ระหว่าง 700-1000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

อุณหภูมิแคลร์ไซน์ (°C)	ขนาดอนุภาคเฉลี่ย (μm)
700	0.20
750	0.30
800	0.44
850	0.66
900	0.87
950	0.95
1000	1.23

4. การตรวจวิเคราะห์โครงสร้างผงผลึกของเซรามิก PMN-PZT

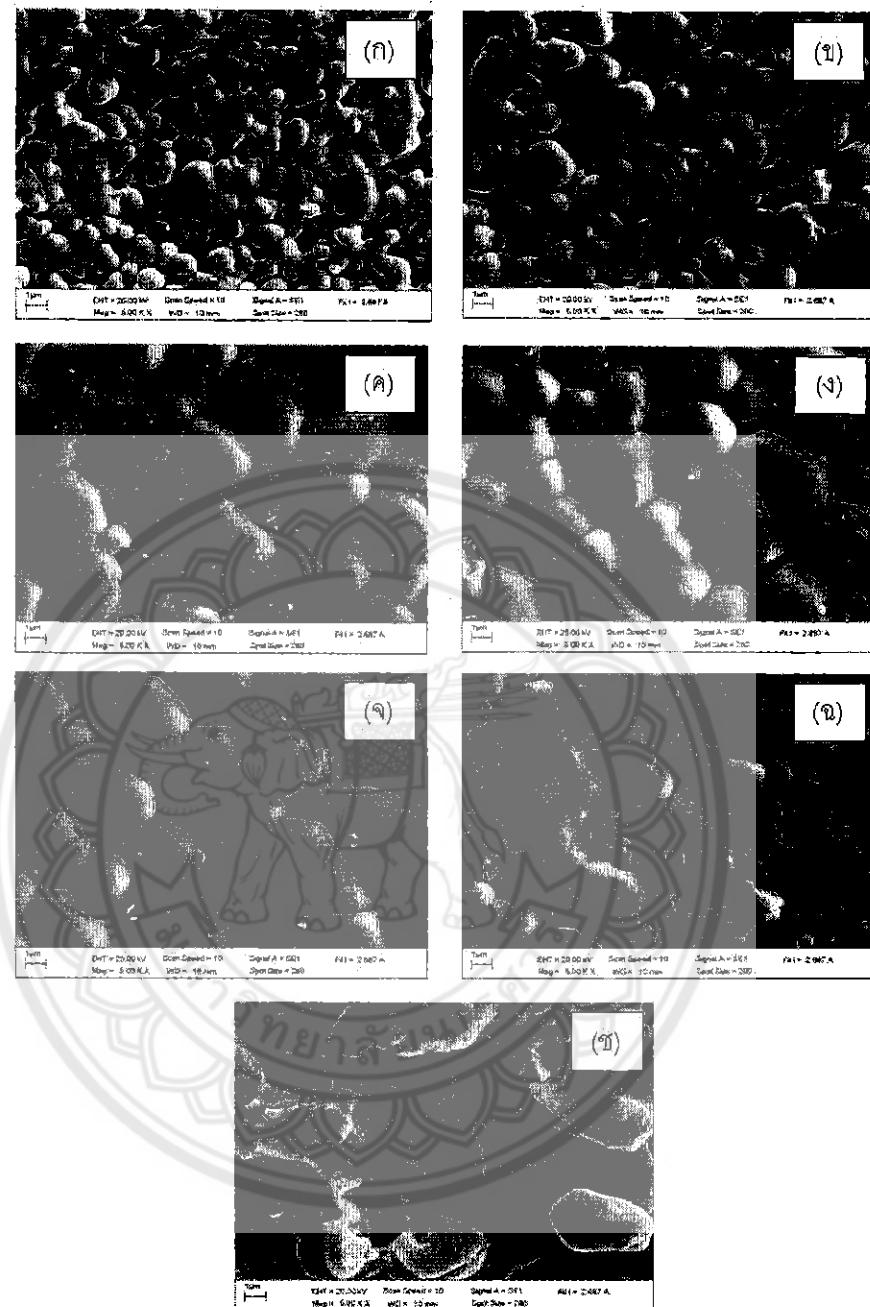
หลังจากการเตรียมผงผลึก PMN-PZT ที่มีความบริสุทธิ์โดยใช้เงื่อยในการแคลร์ไซน์ที่อุณหภูมิ 900 เซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นจะทำการอัดขึ้นรูปผงผลึกตั้งกล่าวและทำการเผาเซินเตอร์ที่อุณหภูมิระหว่าง 1000-1300 องศาเซลเซียส ระยะเวลาในการเผาจะ 2 ชั่วโมง แล้วทำการตรวจสอบเซรามิกที่เตรียมได้ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (X-ray Diffractometer; XRD) พบว่าเซรามิกแสดงโครงสร้างเฟสเพรอฟส์ไกท์แบบบูดคิวบิก (pseudo-cubic) ที่บริสุทธิ์ในทุกอุณหภูมิในการเผาเซินเตอร์ดังแสดงในรูป 33



ภาพ 33 รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของเซรามิก PMN-PZT ที่เผาขึ้นเต็ม
ที่อุณหภูมิ 1000-1300 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง อัตราการขึ้นลง
ของอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียสต่อนาที

5. การตรวจวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคของเซรามิก PMN-PZT

การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของเซรามิก PMN-PZT ผ่านจีโนทอฟที่อุณหภูมิ 1000 ถึง 1300 องศาเซลเซียส ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope: SEM) พบว่าลักษณะเกรนของเซรามิกแบ่งออกเป็นสองลักษณะ โดยที่อุณหภูมิซึ่งเทอร์ต่าเกรนมีลักษณะค่อนข้างกลมและที่อุณหภูมิซึ่งเทอร์สูงเกรนมีลักษณะเป็นรูปหลายเหลี่ยม ดังแสดงในภาพ 34 จากภาพถ่าย SEM ที่บริเวณผิวของเซรามิก PMN-PZT จะสังเกตได้ว่าที่อุณหภูมิซึ่งเทอร์ต่า (ภาพ 34 (ก)) ผิวของเซรามิกมีรูพรุนจำนวนมากซึ่งเกิดจากการหักห้ากของอนุภาคของผลึกภายในเนื้อเซรามิกยังแพคตัวกันไม่หนาแน่นทำให้จุดสัมผัสระหว่างอนุภาคยังมีน้อย ส่งผลให้เกิดช่องว่างระหว่างอนุภาคมาก เมื่ออุณหภูมิในการเผาชินเทอร์สูงขึ้น พบรูพรุนบนผิวของเซรามิกลดลงและขนาดของเกรนมีขนาดใหญ่เล็กปานกัน (ภาพ 34 (ข)(ค)(ง)) ซึ่งการเกิดในลักษณะแบบนี้นั้นจะเกิดขึ้นในระหว่างการเจริญเติบโตของเกรน ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกรนมีขนาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระหว่างที่มีการให้ความร้อน การเติบโตของเกรนนั้นเกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวของขอบเกรนที่ได้รับแรงดันที่เกิดจากความแตกต่างของพลังงานอิสระของเกรนที่อยู่ระหว่างขอบเกรนทั้งสองข้าง ขอบเกรนจะมีการเคลื่อนที่เข้าหาจุดศูนย์กลางความโถงและอาศัยการแพร่ผ่านแนวความโถงเข้ามา ทำให้ขอบเกรนเคลื่อนที่เข้า ซึ่งเป็นการลดพื้นที่ของขอบเกรนลงด้วยการเติบโตของเกรนเพื่อให้ระบบมีพลังงานลดลง และมีความเสถียรมากขึ้น เมื่ออุณหภูมิในการเผาชินเทอร์สูง พบรูพรุนของเซรามิกได้มีการเกิดหลุมและเริ่มมีความชุ่มชื้นบริเวณผิวน้ำของเกรน อีกทั้งบริเวณขอบเกรนเริ่มมีช่องว่างเกิดขึ้น (34 (ฉบ)) และเมื่ออุณหภูมิสูงถึง 1300 องศาเซลเซียส พบว่าผิวน้ำเซรามิกเกิดความชุ่มชื้นและมีหลุมขนาดใหญ่และเกรนของเซรามิกหลอมรวมกันจะไม่เห็นขอบเกรนดังแสดงในภาพ 34 (ช) ซึ่งเกิดเนื่องจาก การที่ใช้อุณหภูมิในการเผาชินเทอร์สูงทำให้เกิดการระเบยของตะกั่วที่ผิวเซรามิก จากการ SEM จะเห็นว่าขนาดเกรนมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออุณหภูมิในการเผาชินเทอร์ 1000 ถึง 1200 องศาเซลเซียส และที่อุณหภูมิซึ่งเทอร์สูงกว่า 1200 องศาเซลเซียส พบว่าขนาดเกรนมีขนาดขนาดลดลง จากการคำนวณขนาดเกรนเฉลี่ยของเกรนเซรามิกแล้วพบว่าเซรามิกมีขนาดเกรนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.07-4.40 ไมโครเมตร โดยขนาดเกรนเฉลี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิเผาชินเทอร์สูงขึ้นดังแสดงในตาราง 3



ภาพ 34 ภาพถ่ายบริเวณผิวน้ำของเซรามิก PMN-PZT ที่เผาขึ้นเตอร์ทีอุณหภูมิ (ก) 1000 (ข) 1050 (ค) 1100 (จ) 1150 (ฉ) 1200 (ช) 1250 และ (ช) 1300 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง อัตราขึ้นลงของอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียสต่อนาที

ตาราง 3 ขนาดเกรนเฉลี่ยของผงผลึก PMN-PZT ที่เผาชินเตอร์ที่อุณหภูมิ ระหว่าง 1000-1300 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

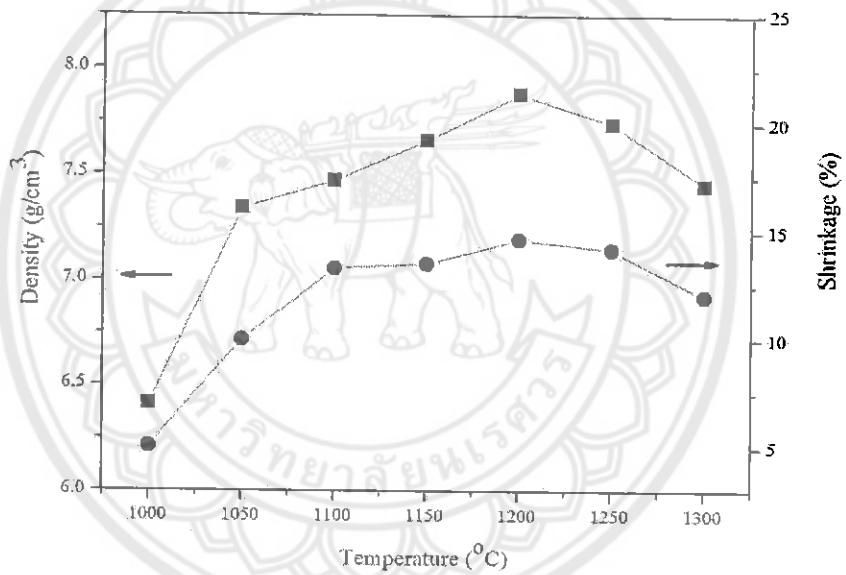
อุณหภูมิเผาชินเตอร์ (°C)	ขนาดเกรนเฉลี่ย (μm)
1000	1.07
1050	2.21
1100	3.71
1150	3.86
1200	4.40
1250	4.20
1300	-

6. สมบัติทางกายภาพของเซรามิก PMN-PZT

หลังจากเผาชินเตอร์เซรามิก PMN-PZT แล้วจะกันน้ำทำการศึกษาสมบัติทางกายภาพของเซรามิก PMN-PZT ได้แก่ ค่าความหนาแน่น ความหนาแน่นสมพัทธ์ และการหดตัวเชิงปริมาตร หลังจากการเผาชินเตอร์ ผลตรวจวิเคราะห์แสดงในตาราง 4 พบว่าเมื่ออุณหภูมิชินเตอร์สูงขึ้นค่าความหนาแน่นของเซรามิก PMN-PZT มีค่าเพิ่มขึ้น เนื่องจากรูพรุนที่อยู่ระหว่างอนุภาคของผงผลึกเริ่มต้นถูกกำจัดโดยกระบวนการชินเตอร์ ซึ่งในช่วงแรกจะเกิดการจัดเรียงตัวใหม่ของอนุภาคและมีการเกิดคอ (neck) บริเวณจุดสัมผัสระหว่างอนุภาคของผงผลึก ส่งผลให้ออนุภาคผงผลึกมีการแพคตัวกันแน่นมากยิ่งขึ้นเพื่อลดพื้นที่ผิวและพลังงานของพื้นผิว และหลังจากนั้นจะมีการเคลื่อนที่ของเกรนและขอบเกรน ซึ่งจะก่อให้เกิดการการเติบโตของเกรน ส่งผลให้ช่องว่างที่เกิดจากรูพรุนเริ่มเกิดการเข้ามาริดกัน ก็จะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายที่รูพรุนในเซรามิกจะเริ่มถูกปิดและค่อยๆ ถูกกำจัดให้หมดไปจากเนื้อเซรามิก โดยอาศัยหลักการแพร่ของอากาศจากรูพรุนออกตามขอกของเกรนจนหลุดออกไปจากเนื้อเซรามิก และจากการคำนวณหาค่าความหนาแน่นของเซรามิก พบว่าที่ตัวอย่างที่ชินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส เซรามิกมีค่าความหนาแน่นสูงที่สุดโดยมีค่าประมาณ 7.88 กรัม/ลบ. ซม. ซึ่งสอดคล้องกับค่าความหดตัวเชิงปริมาตรของเซรามิกที่มีค่ามากที่สุด เช่นเดียวกัน ดังภาพ 35 และเมื่ออุณหภูมิในการชินเตอร์สูงขึ้น พบว่าค่าความหนาแน่นมีค่าลดลง ซึ่งมีสาเหตุเนื่องมาจากการระเหยของตะกั่วในเซรามิก ส่งผลให้เกิดรูพรุนในเนื้อเซรามิกมากขึ้น [11, 12] จากการเบริยบเทียบค่าความหนาแน่นของเซรามิก PMN-PZT ที่เตรียมได้กับความหนาแน่นทางทฤษฎีพบว่าค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์มีค่าสูงสุด 97% ที่อุณหภูมิในการชินเตอร์ 1200 องศาเซลเซียส เซรามิกมีค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์สูงสุด ซึ่งมีค่ามากกว่าเมื่อเทียบกับงานวิจัยอื่นๆ ที่มีค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ในช่วง 83-96% [33, 34]

ตาราง 4 สมบัติทางกายภาพของเซรามิก PMN-PZT ขึ้นเตอร์ที่อุณหภูมิต่างๆ

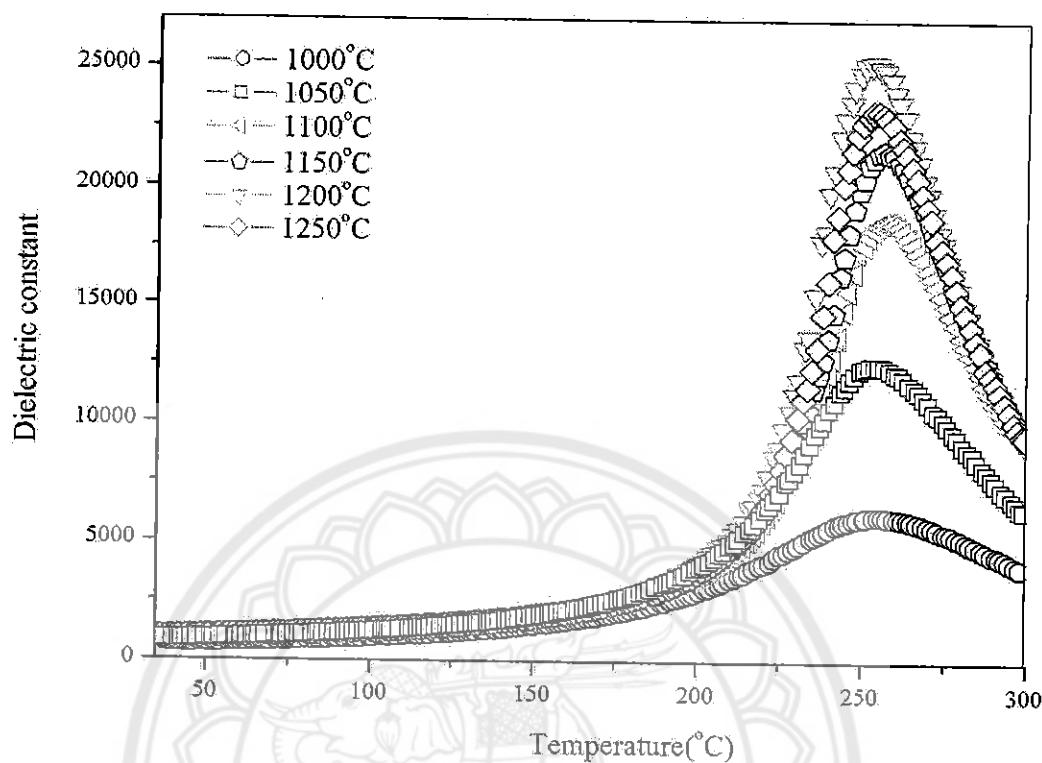
อุณหภูมิเผาขึ้นเตอร์ (°C)	ค่าความหนาแน่น (g/cm ³)	ค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ (%)	ร้อยละของการหดตัว(%)
1000	6.41	78.55	5.06
1050	7.34	89.95	10.0
1100	7.47	91.99	13.53
1150	7.66	94.33	13.33
1200	7.88	97.04	14.66
1250	7.74	95.32	14.20
1300	7.45	91.74	12.06



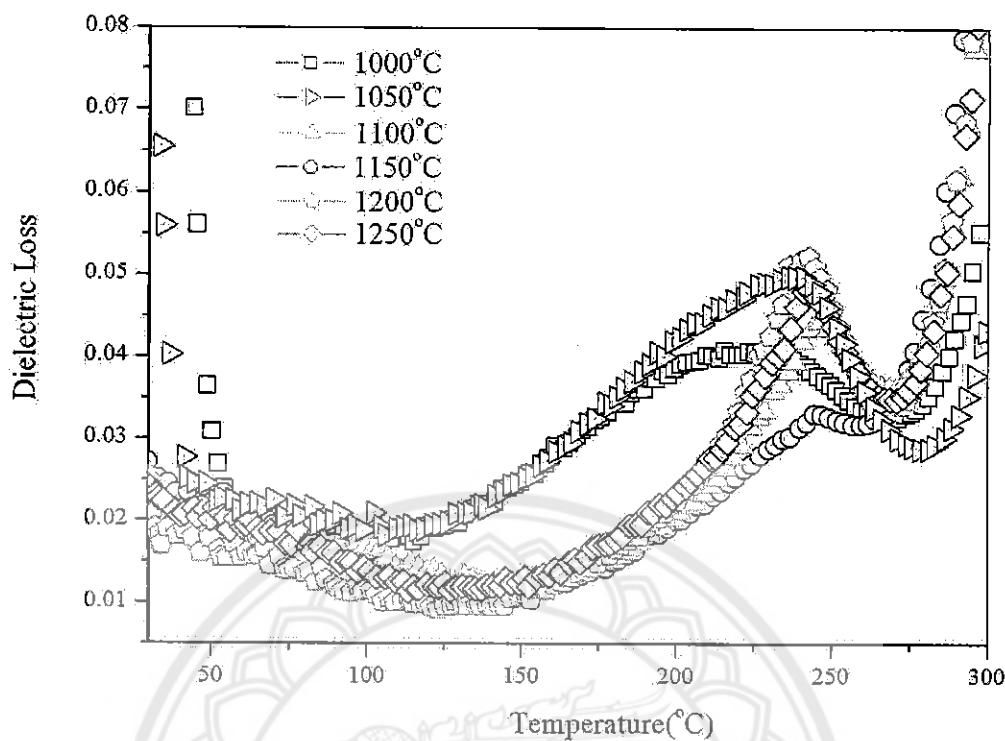
ภาพ 35 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความหนาแน่นและการหดตัวเชิงปริมาตรของเซรามิก PMN-PZT ที่เผาขึ้นเตอร์ที่อุณหภูมิต่างๆ

7. สมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิก PMN-PZT

ผลจากการวัดค่าคงที่ไดอิเล็กทริกและค่าตัวประกอบการสูญเสียไดอิเล็กทริกซึ่งใช้ความถี่ในการวัด 1 กิโลเอิร์ต ของเซรามิก PMN-PZT ชนิดเตอร์ที่อุณหภูมิระหว่าง 1000-1300 องศาเซลเซียส ดังแสดงในภาพ 36 และ 37 จากภาพพบว่าเส้นกราฟระหว่างค่าคงที่ไดอิเล็กทริกกับอุณหภูมิมีลักษณะเป็นพีคที่มีค่าสูงสุดเพียงค่าเดียว จากการวิเคราะห์ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกที่อุณหภูมิห้อง(ค) พบว่า ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่ออุณหภูมิซินเตอร์เพิ่มขึ้นจนถึงที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส และเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 1200 องศาเซลเซียส ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกมีค่าลดลง และในทางกลับกันค่าตัวประกอบการสูญเสียไดอิเล็กทริก ($\tan \delta$) ที่อุณหภูมิห้องมีค่าลดลงจนถึงที่อุณหภูมิ 1200 หลังจากนั้นมีค่าเพิ่มขึ้น ดังแสดงในตาราง 5 ในขณะที่อุณหภูมิซินเตอร์ 1300 ไม่สามารถวัดค่าคงที่ไดอิเล็กทริกได้ เนื่องจากตัวอย่างมีการหลอมจนเกิดการบิดของตัวอย่าง ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกที่อุณหภูมิห้องมีค่าสูงสุดประมาณ 923.92 ที่ตัวอย่างซินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส ซึ่งสอดคล้องกับค่าความหนาแน่น จากการวิเคราะห์อุณหภูมิคูรี (T_c) ของเซรามิก PMN-PZT คือ อุณหภูมิในการเปลี่ยนเฟอร์โรอิเล็กทริกเป็นพาราอิเล็กทริกของเซรามิก พบว่าอุณหภูมิคูรีมีค่าลดลงจาก 256.87 ถึง 251.34 เมื่ออุณหภูมิซินเตอร์เพิ่มขึ้นจนถึง 1200 องศาเซลเซียส เมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 1200 องศาเซลเซียส อุณหภูมิคูรีมีค่าเพิ่มขึ้น ในส่วนของการวิเคราะห์ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกที่อุณหภูมิคูรีพบว่าค่าคงที่ไดอิเล็กทริกมีค่าเพิ่มขึ้นจาก 6092.26 ถึง 25301.20 เมื่ออุณหภูมิซินเตอร์เพิ่มขึ้น 1000 ถึง 1200 องศาเซลเซียส และเมื่ออุณหภูมิซินเตอร์สูงกว่า 1200 องศาเซลเซียส พบว่า ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่ค่าตัวประกอบการสูญเสียไดอิเล็กทริกที่อุณหภูมิคูรี มีค่าใกล้เคียงกันโดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0.034-0.044 ซึ่งอุณหภูมิในการเผาชิ้นเตอร์ไม่ส่งผลกระทบต่อค่าตัวประกอบการสูญเสียไดอิเล็กทริกที่อุณหภูมิคูรี ดังแสดงในตาราง 20 จากการวิเคราะห์ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกและค่าตัวประกอบการสูญเสียไดอิเล็กทริกของเซรามิก PMN-PZT พบว่ามีค่าสอดคล้องกับค่าความหนาแน่น ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างที่มีค่าความหนาแน่นสูง ส่งผลให้มีค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสูงและค่าตัวประกอบการสูญเสียไดอิเล็กทริกต่ำ ซึ่งค่าความหนาแน่นและสมบัติไดอิเล็กทริกมีความสัมพันธ์เนื่องจากปริมาณของ space charge ที่เกิดขึ้นในเซรามิก ซึ่งปริมาณของ space charge ขึ้นอยู่กับระยะห่างของช่องว่างในผลึก (lattice vacancies) หรือความบริสุทธิ์ของพันธะในอะตอมที่เกิดขึ้นภายในเกรน (impurity atoms bounding inside grain boundary) และการก่อรูปของผนังโดเมน (domain wall) โดยการเกิดของ space charge จะไปยับยั้งการเคลื่อนที่ของผนังโดเมนซึ่งจะขัดขวางการเกิดโพลาไรเซชัน ด้วยเหตุนี้ตัวอย่างเซรามิกที่มีค่าความหนาแน่นสูงจะมีปริมาณของ space charge ในปริมาณน้อย เนื่องจาก space charge ที่อยู่บริเวณขอบเกรนถูกกำจัดออกไป เพราะเกรนมีการเติบโตทำให้เกรนซิดกันมากขึ้นที่อุณหภูมิในการซินเตอร์ที่เหมาะสมและเมื่ออุณหภูมิการซินเตอร์สูงเกินไป ส่งผลทำให้ตัวต่ำกว่าเกิดการระเบยทำให้เซรามิกเกิดรูพรุนและพบว่าค่าความหนาแน่นลดลง ทำให้สมบัติไดอิเล็กทริกแย่ลง [7, 35, 36] จากการเตรียมเซรามิก PMN-PZT ด้วยวิธีการเผาใหม่พบว่าเซรามิกที่เตรียมได้มีสมบัติไดอิเล็กทริกค่อนข้างดีกว่าการเตรียมด้วยวิธีอื่นๆ ดังแสดงในตาราง 6



ภาพ 36 ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกและค่าตัวประกอนการสูญเสียไดอิเล็กทริกของเซรามิก PMN-PZT ที่อุณหภูมิซินเตอร์ต่างๆ



ภาพ 37 ค่าตัวประกอบการสูญเสียไดอิเล็กทริกของเซรามิก PMN-PZ
ที่อุณหภูมิซินเตอร์ต่างๆ

ตาราง 5 สมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิก PMN-PZT ที่ซินเตอร์ที่อุณหภูมิต่างๆ

อุณหภูมิเผา ซินเตอร์(°C)	ϵ_r อุณหภูมิห้อง	$\tan \delta$ อุณหภูมิห้อง	T_c (°C)	ϵ_m อุณหภูมิครีวี	$\tan \delta$ อุณหภูมิครีวี
1000	1154.67	1.389	256.87	6092.26	0.034
1050	675.08	0.171	255.86	12465.34	0.041
1100	874.69	0.032	255.20	18579.30	0.031
1150	909.30	0.026	253.86	21559.30	0.040
1200	923.93	0.019	251.34	25301.20	0.044
1250	879.57	0.024	253.86	23200.70	0.042
1300	-	-	-	-	-

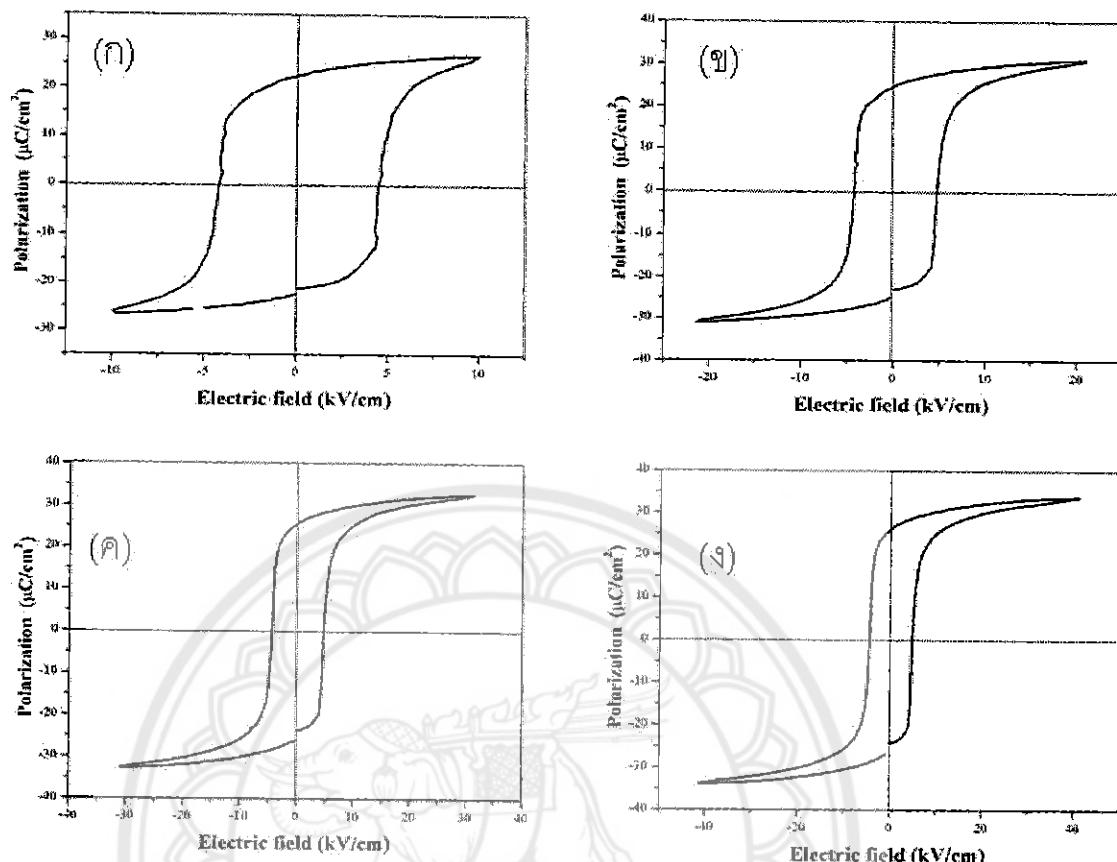
ตาราง 6 สมบัติต่างๆ ของเซรามิก PMN-PZT ที่เตรียมด้วยวิธีอื่นๆ

กระบวนการเตรียมเซรามิก PMN-PZT	ความหนาแน่น สัมพัทธ์(%)	ϵ_r at T_r	$\tan \delta$ at T_r	T_c (°C)	ϵ_m at T_c	$\tan \delta$ at T_m
Combustion method	97.00	913	0.026	~250	25300	0.044
Seeding method [57]	83.77	1200	0.025	~250	4800	0.06
Mixed oxide [49]	96.13	1400	0.03	~160	3800	0.03

7. ค่าสมบัติเพร์โอะลีกทริกและสมบัติพิโซอิเล็กทริกของเซรามิก PMN-PZT

จากการตรวจสอบสมบัติเพร์โओลีกทริกของเซรามิก PMN-PZT ที่ใช้เงื่อนไขในการเตรียม คือ ชินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวเซรามิกแสดงค่าความหนาแน่นสูงสุด โดยใช้สนามไฟฟ้าในการวัดที่ 10-40 กิโลโวลต์ แสดงดังภาพ 38 จากภาพจะเห็นได้ว่าลักษณะของวงวนอิสเทอเรชีสของเซรามิกมีลักษณะที่ต่างกันโดยวงวนมีลักษณะที่เคลบลงเมื่อสนามไฟฟ้าเพิ่มขึ้น และจากการวิเคราะห์ค่าสภาพคงเหลือของโพลาไรเซชัน (remanent polarization; P_r) และค่าสนามลบล้าง (coercive field; E_c) พบว่าค่า P_r มีค่าเพิ่มขึ้นจาก 22.42 ถึง 26.13 $\mu\text{C}/\text{cm}^2$ เมื่อสนามไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจาก 10 ถึง 40 KV และพบว่าค่า E_c มีค่าใกล้เคียงกันโดยมีค่าประมาณ 3.51-3.84 KV โดยที่สนามไฟฟ้าไม่ส่งผลต่อค่า E_c ดังแสดงในตารางที่ 7 จากการคำนวณหาค่าความเป็นเหลี่ยมของของวงวนอิสเทอเรชีส (R_{sq}) ซึ่งคำนวณจากสมการ $R_{sq} = (P_r/P_s) + (P_{1.1Ec}/P_s)$ โดยที่ค่า P_s คือ ค่าโพลาไรเซชันอิมตัว (spontaneous Polarization) และค่า $P_{1.1Ec}$ คือ ค่าโพลาไรเซชันที่ตำแหน่ง 1.1 E_c [54] และค่าความเป็นเหลี่ยมของวงวนอิสเทอเรชีสในอุดมคติมีค่าเท่ากับ 2 [37] จากการคำนวณพบว่าค่าความเป็นเหลี่ยมของวงวนอิสเทอเรชีสของเซรามิก PMN-PZT ที่ความต่างศักย์ของสนามไฟฟ้าต่างๆ มีค่าอยู่ที่ประมาณ 1.33-0.90 และพบว่าค่าความต่างศักย์ของสนามไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ไม่ส่งผลต่อค่าความเป็นเหลี่ยมของวงวนอิสเทอเรชีสของเซรามิก PMN-PZT ดังแสดงในตาราง 8 จากการวัดค่าสัมประสิทธิ์พิโซอิเล็กทริก d_{33} ของเซรามิก PMN-PZT ที่ชินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1200°C พบว่าเซรามิกแสดงค่าสัมประสิทธิ์พิโซ อิเล็กทริก d_{33} เท่ากับ 310 pC/N

จากการเปรียบเทียบสมบัติเพร์โଓลีกทริกและพิโซอิเล็กทริกของเซรามิก PMN-PZT เตรียมโดยวิธีการเผาไหม้กับงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่าค่าโพลาไรเซชันคงค้าง (P_r) และค่าความเป็นเหลี่ยมของวงวนอิสเทอเรชีส (R_{sq}) ของเซรามิกที่เตรียมด้วยวิธีการเผาไหม้ ($P_r = 24.8 \mu\text{C}/\text{cm}^2$ และ $R_{sq} = 1.27$ ที่ $E = 20 \text{ KV}/\text{cm}$) มีค่าสูงกว่าการเตรียมโดยวิธีผสมออกไซน์ (mixed oxide method) ($P_r = 20 \mu\text{C}/\text{cm}^2$ $R_{sq} = 0.95$ ที่ $E = 20 \text{ KV}/\text{cm}$) ในส่วนของค่าสนามลบล้าง (E_c) พบว่าการเตรียมเซรามิกด้วยวิธีการเผาไหม้ ($E_c = 3.96 \text{ KV}/\text{cm}$) มีค่าต่ำกว่าการเตรียมด้วยวิธีผสมเกลือหลอมเหลว ($E_c = 6 \text{ KV}/\text{cm}$)



ภาพ -38 ลักษณะวงวนยิสเทอร์รีซึสของเซรามิก PMN-PZT ชิ้นเดอร์ที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียสและใช้ความต่างศักย์ของสนามไฟฟ้าในการตรวจวัดที่ (ก) 10 (ข) 20 (ค) 30 และ (ง) 40 กิโลโวลต์ต่อเซนติเมตร

ตาราง 7 สมบัติเฟรโรอิเล็กทริกของเซรามิก PMN-PZT ชิ้นเดอร์ที่อุณหภูมิ 1100°C ตรวจสอบด้วยใช้ความต่างศักย์ของสนามไฟฟ้าต่างๆ

ค่าสนามไฟฟ้า kV/cm	P_r $\mu\text{C}/\text{cm}^2$	E_c kV/cm	P_s $\mu\text{C}/\text{cm}^2$	R_{sq}
10	22.42	4.51	26.54	1.33
20	24.88	4.73	30.72	1.27
30	25.62	4.69	32.67	1.11
40	26.13	4.84	33.72	0.90

บทที่ 5

บทสรุป

สรุปผลการทดลองการเตรียมเซรามิก PMN-PZT

เตรียมเซรามิก PMN-PZT ด้วยวิธีการเผาไหม้โดยใช้ไกลเซ็นเป็นเชื้อเพลิง เผาแคลไซน์ที่ อุณหภูมิ 700-1000 องศาเซลเซียส ระยะเวลาในการเผาแซ่ 2 ชั่วโมง ด้วยอัตราการขึ้นลงของ อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียสต่อนาที พบร่วงผลึก PMN-PZT มีโครงสร้างผลึกแบบบูดคิวบิก โดยพบว่า อุณหภูมิแคลไซน์ที่ 850 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง เป็นเงื่อนไขที่ดีที่สุดในการเตรียมผงผลึก PMN-PZT เนื่องจากผงผลึกแสดงค่าร้อยละความบริสุทธิ์ 100 เปอร์เซ็นต์ อนุภาคผงผลึก PMN-PZT มีลักษณะค่อนข้างกลมและมีการเกาะกลุ่มหนาแน่น ขนาดของอนุภาคเฉลี่ยมีขนาดระหว่าง 0.20-1.23 ไมโครเมตร โดยที่ขนาดเฉลี่ยของผงผลึก PMN-PZT มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิในการเผาแคลไซน์ เพิ่มขึ้น และเมื่อทำการอัดขึ้นรูปและเผาขึ้นเตอร์ที่อุณหภูมิ 1000-1300 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง อัตราการขึ้นลงของอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียสต่อนาที พบร่วงเซรามิกแสดงโครงสร้างเฟสเพ อรือฟสไกต์แบบบูดคิวบิก ที่บริสุทธิ์ในทุกอุณหภูมิในการเผาขึ้นเตอร์ และพบว่าเกรนของเซรามิกมี ขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออุณหภูมิในการขึ้นเตอร์สูงขึ้นจนถึงอุณหภูมิ 1200 หลังจากนั้นเกรนมีขนาดเล็กลง เนื่องจากเกิดการหลอมของเกรนเกิดขึ้น พบร่วงที่อุณหภูมิขึ้นเตอร์ 1200 องศาเซลเซียส ระยะเวลาในการเผาแซ่ 2 ชั่วโมง เป็นเงื่อนไขที่ดีที่สุดในการเตรียมเซรามิก PMN-PZT เนื่องจากมีค่าความ หนาแน่น ค่าความhardตัวเชิงปริมาตร และค่าคงที่ไดอิเล็กทริกมีค่าสูงที่สุด โดยมีค่าเท่ากับ 7.66 g/cm^3 , 13.33% และ 25301 ตามลำดับ และพบร่วงเซรามิก PMN-PZT ที่เตรียมด้วยวิธีการเผาไหม้ นั้นเซรามิกมีสมบัติเฟอร์โรอิเล็กทริกที่ดี แต่พบร่วงค่าคงที่พิโซอิเล็กทริกของเซรามิกมีค่าค่อนข้างต่ำ

บรรณานุกรม

- [1] Tokuyama, M. and Soga, J. (2001). Development of a Φ -shaped actuated suspension for 100-kTPI hard disk drives. *IEEE Transactions on Magnetics*, 37, 1884-1886.
- [2] Guo, L. and Martin, D. (1999). Dual-stage actuator control for high density disk drives. In *Proceedings International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics*. United states: IEEE/ASME
- [3] Oboe R. and Murari, B. (2000). Modeling and control of dual-stage actuator hard disk drive with MEMS-based secondary actuator. In *Proceedings 6th International Workshop on Advanced Motion Control*. Italy: Dipartimento di elettronica e informatica, Padova University.
- [4] Samba, T., Hirano, T., Hong, J. and Fan, L. S. (1999). Dual-stage servo controller for HDD using MEMS microactuator. *IEEE Transactions on Magnetics*, 25, 2271-2273.
- [5] Sun, J. and Zhong, Z. W. (2002). Finite element analysis of a IBM suspension integrated with a PZT micro actuator. *Sensors and Actuators A*, 100, 257-263,
- [6] Zeng, T., Dong, X., Mao, C., Chen, S. and Chen, H. (2006) Preparation and properties of porous PMN-PZT ceramics doped with strontium. *Materials Science and Engineering B*, 135 , 50–54.
- [7] Moetakef, P. and Nemati, Z. A. (2009). Study of microstructure and dielectric properties of PMN-PZT ceramics via a mixed powder method including sol-gel precursor. *Journal of Alloys and Compounds*, 476, 791–796.
- [8] Ghasemifard, M., S.M.Hosseini, Bagheri-Mohagheghi, M.M. and Shahtahmasbi, N. (2009). Structure comparison of PMN-PT and PMN-PZT nano crystals prepared by gel-combustion method at optimized temperatures. *Physical E*, 41, 1701–1706.
- [9] Bongkarn, T. and Wattanawikkan, C. (2009).The Influence of Calcination Temperature on Phase and Morphology of $Ba(Sn_{0.05}Ti_{0.95})O_3$ Powders Synthesized via Solid State Reaction Method and Combustion Technique. *Ferroelectrics*, 382, 142-48.
- [10] Bongkarn, T. and Watanawikkan, C. (2008).Fabrication of Barium stannate Tatanate Ceramics via Combustion Method. *Advanced Materials Research*, 55, 173-176.
- [11] Bongkarn, T. and Tangkawsakul, W. (2009). Low temperature preparation of antiferroelectric PZ and PBZ powder Using the Combustion technique. *Ferroelectrics*, 383, 50-56.
- [12] Laowanidwatana, A., Tangkawsakul, W. and Bongkarn, T. (2010).Fabrication of

- ($Pb_{1-x}Ba_x$) ZrO_3 Ceramics via the Combustion Technique, *Ferroelectrics*, 403, 196-203.
- [13] Bongkarn, T. and panya, P. (2009). Fabrication of perovskite Barium Tatanate Ceramics using the Combustion route. *Ferroelectrics*, 383, 102-110.
- [14] Bongkarn, T. and Thongtha, A. (2008). Effect of calcination Temperatures on phase and morphology evolution of ($Ba_{0.25}Sr_{0.75}$)($Zr_{0.75}Ti_{0.25}$) O_3 powder synthesized via solid state reaction and combustion Technique. *Advanced Materials Research*, 55-57, 197-200.
- [15] Thongtha, A. and Bongkarn, T. (2010).Fabrication and Characterization of Perovskite $SrZrO_3$ Ceramics through a Combustion Technique. *Key Engineering Materials*, 421, 223-226.
- [16] Thongtha A. and Bongkarn, T. (2010). Effect of Firing Temperatures on Phase and Morphology Evolution of $CaZrO_3$ Ceramics Synthesized using the Combustion Technique. *Ferroelectrics*, 430, 3-10.
- [17] Jaffe, B., Cook, W.R. and Jaffe, H. (1971).*Piezoelectric Ceramics*. London: Academic Press.
- [18] Cornyn, T. (1998). The role of employers in the development of employability skills in novice workers. Doctoral dissertation, Ph.D., University of Leeds, U. K.
- [19] Haertling, G.H. (1999). Ferroelectric ceramics: History and technology. *Journal of the American Ceramic Society*, 82, 797-818.
- [20] Herbert, J.M. (1985). *Ceramics Dielectric and Capacitors*. London: Gordon and Breach Scienec publishers.
- [21] สุกานดา เจียรศิริสมบูรณ์. (1992). กระบวนการประดิษฐ์สำหรับเซรามิกขั้นสูง. ใน *เอกสารการประกอบการสอนรายวิชา ว. วศ. 210443. เชียงใหม่: ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.*
- [22] Reed, J.S. (1996). *Introduction to the principles of ceramic processing*, New York: Wiley.
- [23] Hart, L.D. and Hudson, L.K. (1994). *American Ceramic Society Bulletin*, 43, 13-15.
- [24] Patil, K.C., Aruna, S.T. and Mirmani ,T. (2002).Combustion synthesis: an update. *Current Opinion in Solid State and Materials Science*, 6, 507-512.
- [25] Merzhanov, A.G. and Borovinskaya, I.P. (1985). *Combustion Science and Technology*, 43, 127,165.
- [26] Merzhanov, A.G. (1990). *Combustion and Plasma Synthesis of High Temperature Materials*, New York: VCH Publication.
- [27] Wiley, J. (1986). *Thermal analysis*. Canada: Sumuitancously.

- [28] สุรินทร์ ลิ่มปนาท และศรีไนน์ ขุนทด. (2543). เครื่องเอกซ์เรย์ดิฟแฟร์กชัน. ในเครื่องมือวิจัยทางวัสดุ: ทฤษฎีและการทำงานเบื้องต้น. (หน้า 309-322). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- [29] กฤษณ์ ศิวะเลิศกมล (2545). กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและอุปกรณ์วิเคราะห์ธาตุรังสีเอกซ์. ในเครื่องมือวิจัยทางวัสดุ: ทฤษฎีและการทำงานเบื้องต้น. (หน้า 289-305). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- [30] ปราณี รัตนวัลลีดิโรจน์. (2543). การหาความหนาแน่นด้วยเครื่องชั่งไฟฟ้า. ในเครื่องมือวิจัยทางวัสดุ: ทฤษฎีและการทำงานเบื้องต้น. (หน้า 158-166) กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- [31] Swart, S. L. and Shrout, T. R. (1982). Fabrication of perovskite lead magnesium niobate. *Material Research Bulletin*, 17, 1245-1250.
- [32] Han, K. R. and Kim, S. (2000). New preparation method of low temperature sinterable $Pb(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O_3$ powder and its dielectric properties. *Journal of Materials Science*, 35, 2055 – 2059.
- [33] Yimnirun, R., Ananta, S. and Laoratanakul, P. (2005). Dielectric and ferroelectric properties of lead magnesium niobate–lead zirconate titanate ceramics prepared by mixed-oxide method. *Journal of the European Ceramic Society*, 25, 3235–3242.
- [34] Moetakef, P. and Nemati, Z. A. (2008). Synthesis of pyrochlore free PMN–PZT ceramics via a seeding method precursor. *Sensors and Actuators A*, 141, 463–470.
- [35] Choi, S. W., Shrout, T. R., Jang, S. J. and Bhalla, A. S. (1989). Dielectric and pyroelectric properties in the $Pb(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O_3$ – $PbTiO_3$ system. *Ferroelectrics*, 100, 29–38.
- [36] Moulson, A. J. and Herbert, J. M. (1990). *Electroceramics*. The university Press, Cambridge.
- [37] Singh, G. and Tiwari, V.S. (2010) Anomaly in dielectric and piezoelectric properties of $(1-x)Pb(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O_3$ - $xPbZrO_3$. *Solid State Communications*, 150, 1778-1781.